平成 28 年度

埼玉大学 大学院 理工学研究科 理工学専攻 人間支援・生産科学コース 博士論文

シリカ凝集体エレクトレットの耐熱性 向上に関する研究

Study on Improvement of heat resistance of silica-aggregate electrets

指導教員 蔭山 健介 教授

14DH002

呉 晨燁

・1-1 背景	4
・1-1-1 エレクトレット	4
・1-1-2 エレクトレットの耐熱性における問題点	6
・1-2 シリカエレクトレット	7
・1-3 シリカ凝集体エレクトレット	8
・1-4 静電噴霧エレクトレット	10
・1-4-1 従来の静電噴霧法	10
 ・1-4-2 静電噴霧によるシリカ凝集体エレクトレット 	11
・1-5 目的	13
第2章 静電噴霧によるシリカ凝集体エレクトレットの作製と電荷保持特性の記	平価 14
・2-1 背景	14
・2-2 実験方法	15
 ・2-2-1 実験材料 	15
・2-2-2 静電噴霧法櫛形電極タイプでシリカ凝集体エレクトレットの製作	≡ 17
・2-2-3 静電噴霧法ゲージ電極タイプでシリカ凝集体エレクトレットの製	作.18
・2-2-4 静電噴霧法グリッド電極タイプでシリカ凝集体エレクトレット	の製作
	19
・2-2-5 静電噴霧法によりシリカ凝集体エレクトレットの表面電位測定	20
・2-2-6 静電噴霧法によりシリカ凝集体エレクトレットの耐熱試験	21
・2-3 実験結果と分析	23
・2-4 結論	32
第3章 シリカ凝集体エレクトレットの耐熱性に及ぼす凝集体形状の影響	33
・3-1 背景	33
・3-2 実験方法	34
・3-2-1 実験材料	34
・3-2-1 実験材料 ・3-2-2 静電噴霧法 ES (Electrostatic spraying)でシリカ凝集体エレクトレ	34 ットを
 ・3-2-1 実験材料 ・3-2-2 静電噴霧法 ES (Electrostatic spraying)でシリカ凝集体エレクトレ 作成 	34 ットを 34
 ・3-2-1 実験材料 ・3-2-2 静電噴霧法 ES (Electrostatic spraying)でシリカ凝集体エレクトレ 作成 ・3-2-3 手動液滴形成させる方法 MD (Manual droplet formation)でシリカ 	34 ットを 34 凝集体
 ・3-2-1 実験材料 ・3-2-2 静電噴霧法 ES (Electrostatic spraying)でシリカ凝集体エレクトレ 作成 ・3-2-3 手動液滴形成させる方法 MD (Manual droplet formation)でシリカ エレクトレットを作成 	34 ットを 34 凝集体 34
 ・3-2-1 実験材料 ・3-2-2 静電噴霧法 ES (Electrostatic spraying)でシリカ凝集体エレクトレ 作成 ・3-2-3 手動液滴形成させる方法 MD (Manual droplet formation)でシリカ エレクトレットを作成 ・3-2-4 シリカ凝集体エレクトレットの表面電位測定 	34 ットを 34 凝集体 34 36
 ・3-2-1 実験材料 ・3-2-2 静電噴霧法 ES (Electrostatic spraying)でシリカ凝集体エレクトレ 作成 ・3-2-3 手動液滴形成させる方法 MD (Manual droplet formation)でシリカ エレクトレットを作成 ・3-2-4 シリカ凝集体エレクトレットの表面電位測定 ・3-2-5 シリカ凝集体エレクトレットの耐熱試験 	34 ットを 34 凝集体 34 36 38
 ・3-2-1 実験材料 ・3-2-2 静電噴霧法 ES (Electrostatic spraying)でシリカ凝集体エレクトレ 作成 ・3-2-3 手動液滴形成させる方法 MD (Manual droplet formation)でシリカ エレクトレットを作成 ・3-2-4 シリカ凝集体エレクトレットの表面電位測定 ・3-2-5 シリカ凝集体エレクトレットの耐熱試験 ・3-2-6 写真分析によりシリカ凝集体のパラメタの測定 	 34 ットを 34 凝集体 34 34 36 38 38
 ・3-2-1 実験材料 ・3-2-2 静電噴霧法 ES (Electrostatic spraying)でシリカ凝集体エレクトレ 作成 ・3-2-3 手動液滴形成させる方法 MD (Manual droplet formation)でシリカ エレクトレットを作成 ・3-2-4 シリカ凝集体エレクトレットの表面電位測定 ・3-2-5 シリカ凝集体エレクトレットの耐熱試験 ・3-2-6 写真分析によりシリカ凝集体のパラメタの測定 ・3-3 実験結果と分析 	34 ットを 34 凝集体 34 36 38 38 41
 ・3-2-1 実験材料 ・3-2-2 静電噴霧法 ES (Electrostatic spraying)でシリカ凝集体エレクトレ 作成 ・3-2-3 手動液滴形成させる方法 MD (Manual droplet formation)でシリカ エレクトレットを作成 ・3-2-4 シリカ凝集体エレクトレットの表面電位測定 ・3-2-5 シリカ凝集体エレクトレットの耐熱試験 ・3-2-6 写真分析によりシリカ凝集体のパラメタの測定 ・3-4 結論 	 34 ットを 34 凝集体 36 38 38 41 57
 ・3-2-1 実験材料 ・3-2-2 静電噴霧法 ES (Electrostatic spraying)でシリカ凝集体エレクトレ 作成 ・3-2-3 手動液滴形成させる方法 MD (Manual droplet formation)でシリカ エレクトレットを作成 ・3-2-4 シリカ凝集体エレクトレットの表面電位測定 ・3-2-5 シリカ凝集体エレクトレットの耐熱試験 ・3-2-6 写真分析によりシリカ凝集体のパラメタの測定 ・3-3 実験結果と分析 ・3-4 結論 第4章 帯電方法と濡れ性を改善したコロイダルシリカを用いたシリカ凝集体 	 34 ットを 34 凝集体 36 38 38 41 57 エレク
 ・3-2-1 実験材料 ・3-2-2 静電噴霧法 ES (Electrostatic spraying)でシリカ凝集体エレクトレ 作成 ・3-2-3 手動液滴形成させる方法 MD (Manual droplet formation)でシリカ エレクトレットを作成 ・3-2-4 シリカ凝集体エレクトレットの表面電位測定 ・3-2-5 シリカ凝集体エレクトレットの耐熱試験 ・3-2-6 写真分析によりシリカ凝集体のパラメタの測定 ・3-3 実験結果と分析 ・3-4 結論 第4章 帯電方法と濡れ性を改善したコロイダルシリカを用いたシリカ凝集体 	 34 ットを 34 凝集体 34 34 36 38 38 38 38 38 38 57 エレク 58
 ・3-2-1 実験材料 ・3-2-2 静電噴霧法 ES (Electrostatic spraying)でシリカ凝集体エレクトレ 作成 ・3-2-3 手動液滴形成させる方法 MD (Manual droplet formation)でシリカ エレクトレットを作成 ・3-2-4 シリカ凝集体エレクトレットの表面電位測定 ・3-2-5 シリカ凝集体エレクトレットの耐熱試験 ・3-2-6 写真分析によりシリカ凝集体のパラメタの測定 ・3-3 実験結果と分析 ・3-4 結論 第4章 帯電方法と濡れ性を改善したコロイダルシリカを用いたシリカ凝集体 トレットの作製と特性評価 ・4-1 背景 	 34 ットを 34 34 34 36 38 38 41 57 エレク 58 58
 ・ 3-2-1 実験材料 ・ 3-2-2 静電噴霧法 ES (Electrostatic spraying)でシリカ凝集体エレクトレ 作成 ・ 3-2-3 手動液滴形成させる方法 MD (Manual droplet formation)でシリカ エレクトレットを作成 ・ 3-2-4 シリカ凝集体エレクトレットの表面電位測定 ・ 3-2-5 シリカ凝集体エレクトレットの耐熱試験 ・ 3-2-6 写真分析によりシリカ凝集体のパラメタの測定 ・ 3-3 実験結果と分析 ・ 3-4 結論 第 4 章 帯電方法と濡れ性を改善したコロイダルシリカを用いたシリカ凝集体 ・ 4-1 背景 ・ 4-2 実験方法 	 34 ットを 34 凝集体 36 38 38 38 57 エレク 58 58 58 58
 ・3-2-1 実験材料 ・3-2-2 静電噴霧法 ES (Electrostatic spraying)でシリカ凝集体エレクトレ 作成 ・3-2-3 手動液滴形成させる方法 MD (Manual droplet formation)でシリカ エレクトレットを作成 ・3-2-4 シリカ凝集体エレクトレットの表面電位測定 ・3-2-5 シリカ凝集体エレクトレットの耐熱試験 ・3-2-6 写真分析によりシリカ凝集体のパラメタの測定 ・3-3 実験結果と分析 ・3-4 結論 第4章 帯電方法と濡れ性を改善したコロイダルシリカを用いたシリカ凝集体 トレットの作製と特性評価 ・4-2 実験方法 ・4-2-1 実験材料 	 34 ットを 34 編集体 36 38 38 41 57 エレク 58 58 60
 ・3-2-1 実験材料 ・3-2-2 静電噴霧法 ES (Electrostatic spraying)でシリカ凝集体エレクトレ 作成 ・3-2-3 手動液滴形成させる方法 MD (Manual droplet formation)でシリカ エレクトレットを作成	 34 ットを 34 凝集体 36 38 38 38 38 57 エレク 58 58 58 60 60 10idal

・4-2-3 グリセリンを塗布後に SC 法を行うことの GSC 法(Glycerin	pre-coating
before SC)でシリカ凝集体エレクトレットを作成	
・4-2-4 グリセリンとシリカの混合溶液塗布の MC 法(Spraying mixed s	solution and
charging droplets) でシリカ凝集体エレクトレットを作成	64
・4-2-5 シリカ凝集体エレクトレットの耐熱試験	65
・4-3 実験結果と分析	66
・4-4 結論	
第5章 結言	
参考文献	
謝辞	

第1章 緒言

·1-1 背景

・1-1-1 エレクトレット

エレクトレット(Fig.1-1)は高分子フィルムなどに電荷が付着し帯電している物質で ある[1,2]。帯電を持続することにより内部で分極が生じ、外部に電界を発生すること ができる。エレクトレット部に使用される高分子フィルムは主にフッ素樹脂が多い、 代表的なものに PTFE(ポリテトラフルオロエチレン),PFA(テトラフルオロエチレン・ パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)(Fig1-2),FEP(テトラフルオロエチレ ン・ヘキサフルオロプロピレン共重合体)等がある。他にも一般的なプラスチックに比 ベ,熱に強い (耐圧性)、薬品に強い (耐薬品性)、接着しにくい (非接着性)、滑りや すい (低摩擦性)、などの特徴がある。特に PFA は同じフッ素樹脂の PTFE よりも極 薄で溶着が容易で FEP よりも融点が高い。エレクトレットを応用した製品の例とし て、携帯電話などの小型のマイクに使われるエレクトレットコンデンサマイクロフォ ン (ECM)、エレクトレット発電機、集塵フィルター、X 線検査機などが挙げられ工 業界で幅広く利用されている[2,3]。

一般的なエレクトレットの作製方法として,絶縁性,誘電性の高い高分子フィルム など(PFA,PTFE など)にコロナ放電によって電荷をチャージする方法がある[4]。こ の方法で作成されるのはフッ素樹脂フィルムエレクトレット。コロナ放電の概要を Fig.1-3 に示す。負の針電極ともう一方の正の電極の間に高い電界をかけることによっ て,空気中の分子から電子が放出される。放出された電子は電界によって加速し,他 の分子に衝突することによって再び電子が放出される。電界によって電子は正極側に 加速され高分子フィルムに衝突することによって,電荷を付加し高分子フィルムをエ レクトレット化する。またグリッド電極とフィルム間の電位差がゼロになると,それ 以上フィルムに電荷が付加されないため,グリッド電極の電圧を変えることによって ゲート電圧と同等の表面電位をフィルムに付加することが出来る。



Fig.1-1 Schematic structure of electret



Fig.1-2 Chemical formula of PFA



Fig.1-3 Schematic structure of corona discharge

・1-1-2 エレクトレットの耐熱性における問題点

エレクトレットを利用した製品(例えば ECM など)が一つの部品として工業製品 に利用される場合などにはプリント基板(電子部品を固定して配線するためのもの) にはんだ付けをし,実装する必要がある。プリント基板上にはんだペースト(はんだ の粉末にフラックスを加えて,適当な粘度にしたもの)を印刷し,その上に部品を載 せてから熱を加えてはんだを溶かす方法。SMT(表面実装技術)と呼ばれ,表面実装 型の部品に用いる。部品の小型化・高密度実装化の進展に伴い,この方式が主流とな り,改良が行われている。

しかし,はんだ付けはリフロー炉での加熱が必要である。リフロー炉での加熱によりはんだを溶かし,部品を基板に固定するという流れである。はんだが溶けるまで, 短時間に250~260℃(リフロー温度)で加熱する。そのため,はんだ以外の基盤や部 品の耐熱性が重要になってきている。だが,リフロー温度で加熱すると高分子フィル ムのエレクトレット表面の電荷、が拡散し(Fig.1-4),表面電位の大きさが減少してし まう。(1-1)式で表される電荷保持率が大幅に低下してしまうという問題点がある[5]。



Fig.1-4 Degradation of the charge retention of the electret

電荷保持率
$$\operatorname{Re} = \frac{ 表面電位の大きさV[kV]}{ 初期表面電位の大きさVi[kV]}$$
(1-1)

・1-2 シリカエレクトレット

フッ素樹脂フィルムエレクトレットの問題点は耐熱性が弱い。そこで耐熱性に優れ るシリカ(SiO2)を考える。シリカという呼び名のほかに無水ケイ酸,ケイ酸,酸化シ リコンと呼ばれることもある,工業分野では主に吸湿性があるので乾燥剤や研磨剤と して利用されている。放電により、シリカに電荷を付着することで、エレクトレット 化する場合はシリカエレクトレットと呼ばれる (Fig.1-5)。

シリカを用いたエレクトレットの研究が数多く行われたが,耐湿性に劣ることが問題となった。これは, Fig.1-6のようにシリカは親水性であるためシリカ表面に水分子が吸着することで表面方向へ電荷が拡散することが原因と考えられる。エレクトレットとして、シリカは高い絶縁性と耐熱性のメリットがありますが、弱い耐湿性のデメリットもある。



Fig.1-5 Schematic structure of silica electret



Fig.1-6 Schematic structure of droplets diffusion along the surface of the hydrophilic silica electret

・1-3 シリカ凝集体エレクトレット

本研究室はシリカを孤立させて疎水性の PFA フィルム上で独立した状態とするこ とで、シリカからの電荷の拡散を防ぐことを考えた[6]。この研究に用いられたシリカ 凝集体とはコロイダルシリカスプレーなどで塗布し、乾燥して得られるシリカ微粒子 のコロイド結晶のことである。そしてシリカ凝集体を塗布後、PFA フィルムにコロナ 放電でエレクトレット化した場合、シリカ凝集体エレクトレットと呼ばれる。

具体的に、まず Fig.1-7(a)のようにコンプレッサーとエアスプレーガン (SPRAY-WORK 株式会社タミヤ)を使用しコロイダルシリカ (20L、日産化学)を噴射させて 行う塗布方法である。噴射量や噴射時間を変化させることにより塗布されるシリカ凝 集体の大きさや質量、間隔などを変化させることができる。シリカ凝集体はランダム に塗布され、凝集体の大きさなどにもばらつきが生じる。塗布されたシリカは半球形 をしており、コロイド結晶構造の状態にあると考えられる。次に Fig.1-7(b)のようにコ ロナ放電によって負電荷をチャージさせる。グリッド電極を利用しシリカ凝集体エレ クトレット表面電位の大きさを簡単に制御できる。今までの研究により、シリカ凝集 体をコロナ放電によりエレクトレット化することで、フッ素樹脂エレクトレットより 耐熱性が向上することを明らかにした[6]。

しかしこの方法では、シリカ凝集体を塗布後にチャージするため、シリカ凝集体だけではなく PFA フィルム上にも電荷が存在してしまう。リフロー温度(約250~260°C)の時、Fig.1-8に示すように、シリカ凝集体に存在する電荷の拡散は防ぐことができるが、PFA フィルム上に存在する負電荷が拡散し、耐熱性も劣化する。シリカ凝集体エレクトレットの耐熱性能を更なる向上させるため、電荷をシリカ凝集体に集中することが重要と考える。そこで著者らは静電噴霧法を用いて PFA フィルム上に負に帯電したコロイダルシリカを塗布することを考えた。



Fig.1-7 Schematic structure of production of silica-aggregate electret



Fig.1-8 Schematic of electlet with silica agglomerates

- ・1-4 静電噴霧エレクトレット
- 1-4-1 従来の静電噴霧法

従来の静電噴霧法は薄膜形成法の一つである。これは液体に高電圧に印加するこ とで得られる微細液滴を堆積させ、薄膜を形成する方法である。静電噴霧法は金属薄 膜の形成、金属酸化物の作製など工業的に様々な分野で応用されている[7.8]。

Fig.1-9 に示すように数 kV 程度の高電圧を有機溶液に印加して,正に帯電させた ポリマー溶液をスプルー状に噴射する現象を利用した方法である。ポリマー溶液を充 填したプラスチックシリンジの先端にある金属ノズルに高電圧を印加すると,静電気 カでポリマー液滴が噴射させる。噴射されたポリマー液滴は全て正に帯電しているの で,液滴同士がクーロン反発力によって微細化を繰り返しながら空間に広がっていく。 一定以下の大きさに微細化された有機液滴は溶媒が蒸発した状態で電極に到達して 薄膜を形成する。



Fig.1-9 Schematic structure of electrostatic spraying method

・1-4-2 静電噴霧によるシリカ凝集体エレクトレット

疎水性のフッ素樹脂フィルムを利用して作成したエレクトレット(Fig.1-10(a))は表 面実装におけるはんだ付けの過程でリフロー温度(約 250℃)において電荷が拡散して しまい,電荷保持率が大幅に減少してしまう,耐熱性が弱いという問題がある。そこ で絶縁性,耐熱性に優れるシリカ(SiO₂)を応用することが考えられ,耐熱性が強いシ リカエレクトレットを作成したが,耐湿性に劣るという特性もある(Fig.1-10(b))。本研 究室ではシリカを孤立させて疎水性の PFA フィルム上で独立した状態とすることで, シリカからの電荷の拡散を防ぐ,シリカ凝集体エレクトレットを作成した (Fig.1-10(c))。フッ素樹脂フィルムエレクトレット以上の耐熱性ができたが,更なる向上で きると考える。

本研究は Fig.1-11 に示すように,静電噴霧法を用いて負電荷が付着したコロイダル シリカ液滴をフッ素樹脂フィルム上に塗布することにより,負電荷がシリカ凝集体に 集中するエレクトレットを作成した。この手法ではフッ素樹脂フィルム表面には負電 荷は存在しないため,耐湿性を維持すると同時に耐熱性は従来のシリカ凝集体エレク トレットより上昇すると考えられる。



Fig.1-10 Schematic of silica aggregate electret film by the electrostatic spray



Fig. 1-11 Photograph of silica aggregate electret film by the electrostatic spray

・1-5 目的

エレクトレットはエレクトレットコンデンサセンサ(以下 ECS)として、マイクロフォンとして広く利用され,超音波センサ,環境発電などの研究も行われている[2,3]。 これらの ECS は基板に実装する際,耐リフロー性を有する必要があるため、エレクトレットの耐熱性の向上が不可欠となる。そして、シリカ凝集体エレクトレットは、コロイダルシリカの塗布だけで耐熱性の改善が可能で、簡便に製造できる点が大きな長所となる。しかし、シリカ凝集体エレクトレットを実用化するためには、シリカ凝集体によるエレクトレットの耐熱性が向上するメカニズムを解明することで、さらにリフロー温度(約250~260℃)における耐熱性を向上させることが必要である。さらに、ECS は、エレクトレットを電極間に挟み込んだ構造となっているが、この際の電極間ギャップはマイクロフォンとして使用する場合 20μm 以下となるのが一般的である。そのため、このような ECS にシリカ凝集体エレクトレットを用いるためには、シリカ凝集体の高さを低減することも望まれる。

そこで、本研究の主な目的は以下の通りである。

- (1)静電噴霧法を用いることで選択的にシリカ凝集体を帯電させたシリカ凝集体エレクトレットを作製するにあたり、安定的に電荷を保持できる最適な静電噴霧手法を開発する。
- (2) シリカ凝集体による耐熱性向上のメカニズムの解明のために、シリカ凝集体の形状パラメタがエレクトレットの電荷保持特性に及ぼす影響を調べる。そして、どのような因子がシリカ凝集体エレクトレットの耐熱性向上に寄与しているかを明らかにする。
- (3) 帯電したコロイダルシリカの微細化を抑制することで、シリカ凝集体の微細化を 防ぐとともに、グリセリンを用いてコロイダルシリカの濡れ性を改善することで、 高さを減少させた扁平な形状のシリカ凝集体の形成手法を検討する。そして、こ れらの結果を利用して高い耐熱性を保持したシリカ凝集体エレクトレットの作製 方法を開発する。

そして、これらの研究成果から、リフロー処理を行う基板実装 ECS に適用可能な 高い耐熱性と、ECS のギャップに配置可能な扁平な形状を有するシリカ凝集体エレク トレットの作製する最適な方法について検討する。

第2章 静電噴霧によるシリカ凝集体エレクトレットの作

製と電荷保持特性の評価

·2-1 背景

従来のシリカ凝集体エレクトレットはコロイダルシリカを塗布・乾燥してシリカ凝 集体を形成後、チャージを行ってエレクトレット化する。そのため、シリカ凝集体だ けではなくフッ素樹脂フィルム上にも負電荷が付着してしまう。その結果、リフロー 温度まで加熱すると、フッ素樹脂フィルム表面近傍に捕獲された負電荷が拡散し、表 面電位の低下を主な原因となる。一方、静電噴霧法を用いると負電荷をシリカ凝集体 に選択的に捕獲させることができる。しかし、従来の静電噴霧法は本来液滴をナノレ ベルまで微細化して均一な塗布を行うための手法である。そのため、同様の手法をコ ロイダルシリカに用いると、微細なシリカ凝集体が均一にフッ素樹脂表面に形成され るため、コロイド結晶構造を有する孤立したシリカ凝集体を得ることはできない。ま た、従来の静電噴霧法は、フィルムの表面電位を制御することはないため、このまま では一定の表面電位を有するエレクトレットを得ることは困難である。

そこで、本研究では、静電噴霧法を応用したいくつかの手法を用いてコロイダルシ リカのシリカ凝集体エレクトレットを作製した。そして、その耐熱性を調べることで、 最適なシリカ凝集体エレクトレットの作製方法を検討した。 ·2-2 実験方法

·2-2-1 実験材料

実験材料は PFA フィルムをアルミ板に溶着して作成した。まず厚さ 12.5µm の PFA フィルム(テトラフルオロエチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体, 潤工社)と市販のアルミニウム板 (厚さ 100µm)を共に 40×40[mm]の大きさに切り取 った。そして、PFA フィルムとアルミニウム板の2つを積層させた。重ね合わせた材 料を Fig 2-1 に示した小型真空蒸着機 (CU-4ST)を用いて溶着を行った。真空チャン バー内に設置されたハロゲンランプヒーター上のアルミナ板(厚さ 2.3mm, 50×50m) に作製した材料を乗せた。そこに被せるようにアーチ状のアルミニウム製の反射板 (厚さ 0.2mm, 35×20mm)を設置した。真空チャンバー内の圧力をポンプで低下させ、 10[Pa]以下になった状態で、ハロゲンランプヒーターにより加熱を行い、PFA フィル ムをアルミ板に溶着させた。

溶着の前に,一回ハロゲンランプヒーターを 10 分間で予加熱した。次からサンプ ル溶着時間は 3~5 分間を目安に行った。チャンバー内での加熱をしすぎると PFA フ ィルムの劣化してしまい,耐熱性の低下を招いてしまうので適切な加熱時間が必要で ある。チャンバー内での加熱が終了後,チャンバーの蓋を開け,材料を取り出し,ホ ットプレートにより 400℃で約 10 秒間加熱を行った。



Fig.2-1 Vacuum deposition equipment



Fig.2-2 The inside of vacuum chamber

静電噴霧法櫛形電極タイプでシリカ凝集体エレクトレットの製作 · 2-2-2 以下三つの静電噴霧改良実験系を用いてシリカ凝集体エレクトレットを試みた。ま ず実験系 A 櫛形電極タイプは Fig.2-3 に示すように、スプレーガンの前部にマスクを 介してくし形電極を設置し,高圧電源ユニット(ESG3-30K01NSK1 エレメント有限会 社) で-20KV を櫛形電極に負荷してコロナ放電を生じさせた。次に、エアスプレーガ ン (SPRAY-WORK 株式会社タミヤ)を用いてコロイダルシリカ (20L, 日産化学)を 霧化し、霧状のコロイダルシリカ液滴をサンプルに吹き付けた。その際、コロナ放電 により液滴を負に帯電させた。液滴をできるだけ帯電させため、スプレーガンとコロ ナ放電帯の間にマスクを介し、通過する液滴はコロナ放電帯に集中させた。そして、 吹き付けたコロイダルシリカを自然乾燥させてシリカ凝集体エレクトレットとした。 塗布時間を調節してエレクトレットの電位を-0.4~-0.7kVとした。櫛形電極の27 本針電極は3行9列の型式で排列した。理論上,針電極の数を増やすことにより,霧 化したコロイダルシリカの液滴をもっと効率的に帯電させることも可能だった。帯電 するシリカ液滴は静電力により、 グラウンドに引つきられ、 サンプルへ落ちる。 帯電 しないシリカ液滴の運動軌跡はほぼ直線なので,到達場所は帯電シリカの後ろになる。 櫛形電極とサンプルの間の距離 d は 18 から 28cm までに設定する。スプレーガンの 途布時間 T は 60 から 300 秒までに設定する。



Fig.2-3 Experimental setup for preparation of silica-agglomerate electret using electrostatic spraying of comb-shaped electrode type.

・2-2-3 静電噴霧法ゲージ電極タイプでシリカ凝集体エレクトレットの製作 実験系 B ゲージ電極タイプは Fig.2-4 に示すように、高圧電源ユニットで-20KV に 負荷したスプレーガンの前方にリング電極を設けることで、効率的に液滴を帯電させ た。リング電極の径は 5cm, 厚さは 2mm, 円心とスプレーガンノズルの距離は 1.5cm。 次に、エアスプレーガンを用いてコロイダルシリカを霧化し、霧状のコロイダルシリ カ液滴をサンプルに吹き付けた。金属のスプレーガンは-20kV に負荷したゆえに、コ ロイダルシリカ液滴はほぼ全部帯電したと考える。-20KV に負荷したスプレーガンと グランドに接続リング電極は近距離で強い電場を生じさせた。結果的に、液滴の帯電 量も上昇した。そして帯電した液滴がサンプルに集中するように、サンプルの周囲に -2kV に負荷したケージ電極を設置し、周りから中央への電場を発生させる。ケージ電 極は 10cm×10cmの立方体。スプレーガンノズルとサンプルの間の距離 d は 9 から 18cm までに設定する。 dが増大あるいは減少すると、サンプルに到達する帯電 液滴の量が減少し、表面電位が低下する。スプレーガンの塗布時間 T は 15 から 60 秒 までに設定する。



Fig.2-4 Experimental setup for preparation of silica-agglomerate electret using electrostatic spraying of cage-electrode type.

・2-2-4 静電噴霧法グリッド電極タイプでシリカ凝集体エレクトレットの製作

実験系 C グリッド電極タイプは Fig.2-5 に示すように、サンプルの上部に針電極を 設置し、高圧電源ユニットで-20KV を針電極に負荷してコロナ放電を生じさせた。そ してエレクトレットの表面電位をコントロールするため、針電極とサンプルの間に-1kV に負荷したグリッド電極を設置した。この部分は一般のコロナ放電装置とは同じ だった。この方法は放電前にまず、針電極放電なしの状態で、エアスプレーガンを用 いてコロイダルシリカ液滴の吹き付けを開始する。その直後に、針電極に高圧を負荷 し、コロナ放電により液滴を負に帯電させた。そして、吹き付けたコロイダルシリカ を自然乾燥させてシリカ凝集体エレクトレットとした。スプレーガンノズルとサンプ ルの間の距離 d は 14 から 20cm までに設定する。スプレーガンの塗布時間 T は 6 か ら 15 秒までに設定する。



Fig.2-5 Experimental setup for preparation of silica-agglomerate electret using electrostatic spraying of grid electrode type.

 ・2-2-5 静電噴霧法によりシリカ凝集体エレクトレットの表面電位測定 表面電位の測定には静電電位計 ESD (ZJ-SD オムロン)を使用した。Fig.2-7 のよう に z 軸ステージの上に静電電位計を設置した。測定時にはエレクトレットをステージ の上に置き、エレクトレットと表面電位計の距離が 5mm となるように設定した。測 定される表面電位はエレクトレット表面の中央 25mm×25mm 範囲内の平均値である。 直流電源(GPR-100H05D,株式会社インデックスジャパン)を用いて-1kV の電圧を かけたときに、センサとの距離が 5mm のときの電位を用いて校正した。



Fig.2-6 Electrostatic electrometer



Fig.2-7 Schematic of electrometer

・2-2-6 静電噴霧法によりシリカ凝集体エレクトレットの耐熱試験

加熱試験は Fig.2-8 に示すようにホットプレート上で行った。始めにサンプルをホ ットプレート上に乗せ,静電電位計 ESD を用いて表面電位の大きさを測定した。そ の時における表面電位の大きさを初期表面電位 V₀とした。

サンプルとセンサの距離が 10mm の状態でエレクトレット上に重石となるアルミ 板の治具(厚さ 3mm 穴径 φ 30mm)を乗せてサンプルを固定した。アルミ板の穴を シャーレ(高さ 15mm, φ 35mm)で塞ぎ,外界からの影響を防いだ。ホットプレート 表面とサンプルの間にシース熱電対を設置し温度測定を行った。加熱温度はシース熱 電対(径 1mm,K タイプ)を用いてホットプレート中心の温度を測定した。加熱試験の 温度曲線の一例を Fig.2-9 に示す。100℃以上での昇温速度はおよそ 4℃/min として, サンプルを加熱し,静電電位計 ESD (ZJ-SD,オムロン)を用いて 5min おきに温度と表 面電位 Vs の測定を行った。耐熱試験終了後,小型扇風機で約 100℃まで徐冷を行っ た。この一連の作業を耐熱試験1セットとして行った。

加熱実験に測定した表面電位の大きさ Vs と加熱前の初期電位 V₀を利用して(2-1) 式で電荷保持率 Re を算出する, Fig.2-10 に電荷保持率 Re と温度 T の典型的な曲線 であった。実験データ間の線形補間を用いて 250℃での電荷保持率 R250 を計算した (測定間隔が 5 分に固定されているため,250℃の実験データは得られなかった)。シ リカ凝集体エレクトレットをセンサとして利用には、リフロー温度(250℃~260℃) を克服しなければならない。ゆえに、我々は 250℃での電荷保持率 R250 を利用し、 サンプルの耐熱性能を評価した。

電荷保持率
$$Re = \frac{\overline{Re} \equiv \overline{Re} \equiv \overline{Re} [kV]}{\overline{NHR} \equiv \overline{Re} [kV]}$$
 (2-1)



Fig.2-8 Experimental setup for heating test using hot plate



Fig.2-9 Typical temperature curve in heating test



Fig.2-10 Typical Re behavior with temperature at heating test

・2-3 実験結果と分析

実験系 A 櫛形電極タイプ,実験系 B ゲージ電極タイプ,実験系 C グリッド電極タ イプ (以下は実験系 A, B, C で)を用いて,作製したシリカ凝集体エレクトレット の測定結果は以下に示す。Table.2-1 には作製した静電噴霧エレクトレットの実験条件 と実験結果を示す。シリカ凝集体の塗布量 ms はサンプル塗付前とシリカ凝集体乾燥 後の質量の差とした。初期表面電位 V_0 は静電電位計を使用して,シリカ凝集体作成 後,加熱実験前の電位の大きさ。Fig.2-11~Fig.2-42 は各サンプルの実体顕微鏡による 表面写真である。Fig.2-43~Fig.2-52 は各サンプル加熱実験の電荷保持率 Re と温度 T の 関係曲線である。そして 2-2-6 に説明どおり,各サンプル 250℃での電荷保持率 R250 を計算した。

シリカ凝集体の塗布量 ms は,距離 d に依存性する。基本的に実験系 A と実験系 B の塗布量 ms が d の減少とともに増加する。それぞれ ms の最大値は,実験系 A の d が 23 cm;実験系 B の d が 18 cm である時に得た。したがって,実験系 C の方がより 大きな d 値の場合 ms の最大値が得られた。実験系 A, B, C では,噴霧方向はサンプ ル表面に平行であり,Fig.2-3,Fig.2-4 と Fig.2-5 に示すように帯電した液滴のみを引 きつけた。実験系 A と B には, d が帯電液滴の移動距離に意味する。d の増大ととも に,帯電液滴の大きさと速度が減少し,サンプルに引きつけられる可能性も減少した。実験系 C の放電部分はサンプルの上部であり,帯電液滴の移動距離と d は無関係だ った。そして d が小さすぎて,液滴の大きさと速度が大きい。静電気力が液滴を引き 付けるほど強くない場合,比較的重い液滴はサンプルに到達できなかった。

Fig.2-53 は Table.2-1 に示し, 各方法で作製したサンプルのシリカ凝集体の塗布量 ms と初期表面電位 V_0 の関係を展示した。 V_0 はどのような方法を使っても ms に依存しな かった。その原因は液滴の帯電量が不均一,そして放電部からサンプルに直接なコロ ナ放電の影響と思う。実験系 A には dが増大すると,サンプルに到達する液滴の中に 帯電しない液滴の割合が上昇し,表面電位が低下した;dが減少すると,櫛形電極か らサンプル表面へ直接なコロナ放電の可能性も増加し,表面電位が上昇するが,耐熱 性が低下した。そして Fig.2-53 に示すように,実験系 A の V_0 は他の方法を用いた場 合より小さかった。実験系 A の方法で塗布開始の直後,サンプルが負に帯電すると, スプレーガンから追加の帯電液滴の間に静電反発力が発生した。最終的に,サンプル の表面電位がある程度に到達する時,帯電した液滴は実験系 A でサンプルに引き付

23

けられなかった。一方,実験系 B は Fig.2-4 に示す通り,-2kV が負荷されたケージ電極によってより多く帯電液滴をサンプルに引き付けられたので, V_0 が増強された。しかしながら,実験系 B で作成したサンプルには, V_0 が制御されなかったので, Fig.2-53 に大きな散乱を示した。実験系 B には金属のスプレーガンに高電圧に負荷したので,噴霧した液滴がほぼ全部帯電すると考えるが,接触面積空気湿度などの原因で,液滴の帯電量が不均一, V_0 は ms に依存しなかった。実験系 C は Fig.2-5 に示す通り,グリッド電極を用いて V_0 を制御することができた。最終的に, V_0 >0.9kV のサンプルは,簡単で安定的に得られた。

Fig.2-11~Fig.2-42 は実験系 A, B および C を使用してサンプル上のシリカ凝集体を 実体顕微鏡で観察した写真を示す。実験系 A および B を用いてサンプル上 100μ m を 超える凝集体の周囲に小さなシリカ凝集体を分布させた。実験系 C で作成したサンプ ル上の微小シリカ凝集体の数を大幅に減少させた。Fig.2-3, Fig.2-4 と Fig.2-5 に示す ように、実験系 A と B の帯電液滴は C より長い距離に移動した。これにより、液滴 のクーロン反発力は、飛行中に溶液の蒸発によって高められた。最終的に、実験系 A と B の帯電液滴はクーロン爆発により、小さな液滴に分裂した[9,10]。 実験系 C を 用いてサンプル上のシリカ凝集体は、完全に互いに分離されているので、研究目的の ために望ましい分布を示した。

Fig.2-54 は Table.2-1 に示した実験系 C の 250℃における電荷保持率 R250 とシリカ 凝集体の塗布量 ms を示した。方法 C を用いたサンプルの R250 は,常に 57%より高 い値を示した。加熱試験時にサンプルが 12.5 分間 200~250℃の高温に曝された。ECM のリフロー処理中,この温度帯での加熱時間は,一般に 120 秒未満になるように設計 される。加熱時間に比例する場合,実験系 C の R250 はリフロー処理時に 90%以上で なると考える。凝集体が乾燥後コロナ放電で作成した従来のシリカ凝集体エレクトレ ットは同じ加熱実験中に,最大 0.62 平均 0.54 の R250 結果が得た[6]。それに対して, 実験系 C の R250 は最小 0.58 最大 0.8 平均 0.71 の結果があった。ゆえに,静電噴霧法

(グリッド電極タイプ)は耐熱性の高いシリカ凝集体エレクトレットを得るための優れた技術であると結論付けることができる。

24

Sample	実験条件			実験結果		
Code	実験系	<i>d</i> (cm)	塗布時間(s)	塗布量 ms (g/m ²)	初期表面電位 V ₀ (kV)	R250
A1	А	25	120	7.33	0.42	0.74
A2	А	25	60	5.19	0.61	0.78
A3	А	25	60	5.32	0.55	0.65
A4	А	23	60	6.23	0.60	0.75
A5	А	23	120	12.71	0.77	0.72
A6	А	23	180	14.54	0.52	0.89
A7	А	20	120	13.78	0.70	0.80
A8	А	18	60	2.89	0.71	0.32
A9	А	18	120	6.43	0.74	0.63
A10	А	23	300	28.3	0.78	0.75
B1	В	9	15	2.74	0.59	0.70
B2	В	18	60	14.38	0.61	0.88
B3	В	18	45	14.41	0.73	0.80
B4	В	18	30	10.49	0.49	0.86
B5	В	18	45	10.87	0.51	0.85
B6	В	9	45	10.73	1.40	0.41
B7	В	9	30	6.39	1.27	0.35
B8	В	12	45	5.41	0.80	0.72
B9	В	15	60	9.23	0.88	0.82
B10	В	9	15	2.51	1.18	0.40
B11	В	12	45	5.41	0.75	0.80
B12	В	12	60	7.43	1.14	0.64
C1	С	14	6	8.33	0.99	0.69
C2	С	14	10	13.84	1.11	0.72
C3	С	20	6	5.76	1.00	0.74
C4	С	20	10	8.35	1.03	0.75
C5	С	18	10	9.9	1.05	0.68
C6	С	18	6	5.44	1.01	0.71
C7	С	18	8	6.79	1.01	0.73
C8	C	18	8	6.02	1.22	0.72
C9	C	18	7	3	1.21	0.6
C10	C	18	6	4.98	1.14	0.67

Table.2-1 Experimental conditions and experimental results of each method



Fig.2-11 Samples A1





Fig.2-13 Samples A3





Fig.2-14 Samples A4



Fig.2-15 Samples A5





Fig.2-17 Samples A7





Fig.2-18 Samples A8



Fig.2-19 Samples A9





Fig.2-21 Samples B1





Fig.2-22 Samples B2



Fig.2-23 Samples B3



Fig.2-24 Samples B4



Fig.2-25 Samples B5



Fig.2-26 Samples B6



Fig.2-27 Samples B7





Fig.2-29 Samples B9





Fig.2-30 Samples B10



Fig.2-31 Samples B11



Fig.2-32 Samples B12



Fig.2-33 Samples C1



Fig.2-34 Samples C2



Fig.2-35 Samples C3





Fig.2-37 Samples C5





Fig.2-39 Samples C7







Fig.2-41 Samples C9





Fig.2-42 Samples C10







Fig.2-53 Comparison of V_0 for the prepared samples using method A, B and C.



Fig.2-54 The R250 behavior with ms of the samples obtained by method C.

・2-4 結論

本章は従来の静電噴霧法を改良し,櫛形電極タイプ,ゲージ電極タイプ,グリッド 電極タイプ三つの方法でシリカ凝集体エレクトレットを製作した。そして,得られた エレクトレットにおいて初期表面電位 V₀とシリカ凝集体の塗布量 ms を測定した。さ らに,加熱試験を行うことで作製したエレクトレットの耐熱性を評価した。

グリッド電極型の手法(実験系 C)で作成したシリカ凝集体エレクトレットは最も優れた性能を示した(V₀ >0.95kV; R250>0.58)。また,手法 C においては,エレクトレットの V₀を安定して制御できた。さらに,実体顕微鏡の観察により,手法 C で得られたサンプル上のシリカ凝集体は互いに孤立しおり,微細なシリカ凝集体の形成が抑制されていたことから,これが最も優れた耐熱性を示した原因と考えられる。一方,シリカ凝集エレクトレット初期表面電位 V₀および電荷保持率 R250 とシリカの塗布量ms との間に相関は認められず,シリカ凝集体の電荷保持特性に影響を与えている因子は塗布量ではないことが明らかとなった。

これらの結果から以降の章では、静電噴霧方を用いたシリカ凝集体の作製手法は実 験系 C とし、得られたシリカ凝集体エレクトレットを ES (electrostatic spraying) と呼 ぶこととする。また、1-3 に説明した、コロイダルシリカを塗布・乾燥してシリカ凝 集体形成後、コロナ放電でエレクトレットした従来のシリカ凝集体エレクトレットを CC サンプル (corona-charging after spraying) と呼ぶこととする。

第3章 シリカ凝集体エレクトレットの耐熱性に及ぼす凝

集体形状の影響

·3-1 背景

前章において静電噴霧を用いたシリカ凝集体エレクトレットの作製方法を最適化 することで,得られたシリカ凝集体エレクトレット(ES)は,従来のシリカ凝集エレク トレット (CC) より高い耐熱性能を示すことが明らかとなった。しかしながら,シリ カ凝集体の塗布量と耐熱性との間に相関は認められず,ES については他のシリカ凝 集体エレクトレットに関する因子が耐熱性に影響を及ぼしていると推察された。

そこで、本研究ではシリンジを用いて単一のシリカ凝集体エレクトレットを作製す るとともに、その耐熱性を ES と比較した。そして、初期表面電位、凝集体の径、高 さ、点密度など各種の形状パラメータとエレクトレットの耐熱性との相関を調べ、ど のような因子がシリカ凝集体エレクトレットの耐熱性に影響を与えているか検討を 行った。

- ·3-2 実験方法
- ·3-2-1 実験材料

第二章と同様に,厚さ 12.5µm の PFA フィルムを 0.1 の市販の Al 板上に真空溶着 により、サンプルとした。

・3-2-2 静電噴霧法 ES (Electrostatic spraying)でシリカ凝集体エレクトレットを作成

本章は以下二つの方法でシリカ凝集体エレクトレットを作成した。まず 2-2-4 に説 明どおり,静電噴霧法グリッド電極タイプで ES サンプルを作る。初期表面電位 V₀ と 電荷保持率 R250 の関係を研究するため, Fig.2-5 に示したグリッド電極を利用して, ES サンプルの電位を制御した。スプレーガンノズルからサンプルまでの距離 d は 18cm に固定した。グリッド電極の電圧は-0.4kV から-1kV まで設定して, 8 秒の塗布 により,違い表面電位を持つ ES サンプルを作成した。

・3-2-3 手動液滴形成させる方法 MD (Manual droplet formation)でシリカ凝集 体エレクトレットを作成

シリカ凝集体の平均直径 D と電荷保持率 R250 の関係を研究するため、平均直径 D 以外のパラメタを固定しなければならない。手動液滴形成させる方法 MD は注射 器を使用して、PFA フィフム表面に一個だけのシリカ凝集体を形成させる方法であ った。注射器の流量をコントロール通して、シリカ凝集体の直径を制御できた。 Fig.3-1 に示すようにコロイダルシリカ (20L、日産化学)を充填した内径 0.5mm の 注射器を使用して、サンプル表面にコロイダルシリカ液滴を形成させる。そして金 属の注射針が液滴内部に維持し、-1kV の電圧を負荷した。電圧でのチャージ時間は 15 秒。最後注射器を除去した後、液滴をホットプレート上に 50℃で乾燥しました。 この方法で製作したシリカ凝集体エレクトレットは MD サンプルと呼ぶ。



Fig.3-1 Schematic of manual droplet formation using a negatively charged syringe

・3-2-4 シリカ凝集体エレクトレットの表面電位測定

2-2-5 に説明通り,静電電位計 ESD (ZJ-SD オムロン)を使用して ES サンプルの初 期表面電位 V_0 を測定した。しかし,ESD はエレクトレット表面の中央 25mm×25mm 範囲内の平均値を出すしかできない。シリカ凝集体大きさが 25mm×25mm 以下の MD サンプルは ESD により表面電位の測定値 V_a は実際の V_0 より小さかった。ゆえに MD サンプルに対して,表面電位の較正は必要だった。

較正方法は Fig.3-2 に示すように実行した。Fig.3-2 (a) は大きさ 25mm×25mm 以下, 直径 Dc の円形範囲の実際電位 V_0 の測定方法である。左は側面図, 右は平面図。 PFA フィルム上に直径 Dc の穴があったポリマフィルムを載せて, コロナ放電により 全面チャージした。Fig.3-2 (a) の平面図どおり, チャージエリアは ESD の測定エリ ア (25mm×25mm) より大きい。そして全面チャージのため, 測定した電位は穴部分 の実際電位 V_0 と考えた。次, Fig.3-2 (a) に示すように PFA フィルム上のポリマフィ ルムを除去し, 残した穴部分のチャージエリアの電位を測定した。その時測定値は見 かけ電位 V_a だった。そして Dc の値を変わって, 多数実験により, V_a , V_0 と Dc の関 係を見つかった。

Fig.3-3 に直径 *Dc* の帯電領域の実際電位 V_0 と見かけ電位 V_a の関係を示した。黒い 曲線は最小二乗法で計算した近似曲線だった。式(3-1)は近似曲線の方程式であった。 ImageJ (オープンソース画像処理プログラム)を利用して[11], MD サンプルの表面写 真から,シリカ凝集体の直径を計算することができた。そして ESD で見かけ電位 V_a を測定した。最後,式(3-1)により, MD サンプル実際の初期表面電位 V_0 を計算した。 以下, MD サンプルの表面電位というのは、全部較正した実際初期表面電位の大きさ V_0 である。

$$V_a/V_s = 1 - e^{-0.024D_c^2}$$
(3-1)


(a) The left side is a side view and the right side is a top view.



(b) The left side is a side view and the right side is a top view.

Fig.3-2 Calibration of the surface electric potential for MD samples



Fig.3-3 Relationship between Dc and Va/V_0 for masked specimens

・3-2-5 シリカ凝集体エレクトレットの耐熱試験

ES サンプルと MD サンプルの加熱試験は Fig.2-8 に示すようにホットプレート上で 行った。実行方法は 2-2-6 に説明どおりだった。電荷保持率 Re と温度 T の曲線から 250℃における電荷保持率 R250 を計算し、サンプルの耐熱性能を評価した。

・3-2-6 写真分析によりシリカ凝集体のパラメタの測定

シリカ凝集体エレクトレット電荷保持率 *R250*に関する要素を研究するため, ImageJ (オープンソース画像処理プログラム)を利用して[11],各サンプルの表面写真から シリカ凝集体対サンプルの面積率 *fa*;シリカ凝集体の点密度 *N*(一平方ミリメトル内 の凝集体数);シリカ凝集体の平均直径 *D*を測定した。

ここは例として Fig.3-4 の写真から, fa, NとDの算出方法を説明する。まず ImageJ で写真の明るさ、コントラストと閾値を調節して、Fig.3-5 のように計算すべきシリカ 凝集体の部分を選びました。次、Fig.3-6 のように analysis particle の条件を設定し、サ イズ 300 pixels (実際サイズ 13.35 μ m²) 以上のシリカ凝集体を選ぶ。孤立状態によう て、複数のシリカ凝集体は連続する可能があるので、ImageJ に circularity を 0.2~1 を 設定し、孤立するシリカ凝集体を選びます。ImageJ の analysis particle 機能により、点 密度 N を出します。最後は Fig.3-7 に示すように、条件に満足するシリカ凝集体が選 択さら、各凝集体の面積率 fa と平均直径 D を計算できる。

目的として,孤立で大きなシリカ凝集体が望ましい,そして大量な微細凝集体に帯 電量が非常に少ない,分析の時省略できると考えた。ゆえに,直径 60 μ m以上のシリ カ凝集体を選び,それらのパラメタを計算した。以下各サンプルの面積率 fa, 点密度 N, 平均直径 D, 全部直径 60 μ m以上のシリカ凝集体の計算結果だった。

38



Fig.3-4 Example photo



Fig.3-5 Processed photo

🛓 Analyze Particles
Size (pixel^2): 0-Infinity Circularity: 0.20-1.00
Show: Overlay Outlines -
 Display results Exclude on edges Clear results Include holes Summarize Record starts Add to Manager In situ Show
OK Cancel Help

Fig.3-6 Set parameters to select silica aggregates



Fig.3-7 Selected silica aggregates

·3-3 実験結果と分析

本章はシリカ凝集体エレクトレットの耐熱性に影響を与えている因子の検討を行った。具体的はエレクトレットの初期表面電位 V₀;シリカ凝集体対サンプルの面積 率 fa;シリカ凝集体の点密度 N(一平方ミリメトル内の凝集体数);シリカ凝集体の平 均直径 D。

静電噴霧法 ES (Electrostatic spraying), 手動液滴形成させる方法 MD (Manual droplet formation)を用いて, 作製したシリカ凝集体エレクトレットの測定結果は以下に示す (以下は ES 法, MD 法で)。作製したシリカ凝集体エレクトレットの測定結果は以下 に示す。

Table.3-1 には ES 法で作製したシリカ凝集体エレクトレットの実験条件と実験結果 を示す。ES01 から ES10 までのサンプルは Table.2-1 に列挙した C1 から C10 のデー タだった。本章追加したデータと統一するため、サンプルコードを変わった。さらに 写真分析により各サンプルの D, N と fa の値を算出した。グリッド電位は Fig.2-5 に 示した実験装置のグリッド電極の設定値であった。シリカ凝集体の塗布量 ms はサン プル塗付前とシリカ凝集体乾燥後の質量の差とした。初期表面電位 V₀ は静電電位計 ESD を使用して、シリカ凝集体作成後、加熱実験前の電位の大きさ。Table.3-2 には MD 法で作製したシリカ凝集体エレクトレットの実験条件と実験結果を示す。流量と は Fig.3-1 に示した実験装置の注射器によりコロイダルシリカ溶液の滴下量だった。 MD サンプルの V₀ はすでに較正した実際の初期表面電位だった。Fig.3-8~Fig.3-43 は 各サンプルの実体顕微鏡による表面写真である。Fig.3-44~Fig.3-55 は各サンプル加熱 実験の電荷保持率 Re と温度 T の関係曲線である。そして 2-2-6 に説明どおり、各サ ンプル 250℃での電荷保持率 R250 を計算した。

Sample	グリッド	塗布量	初期表面電位	面積比	点密度	平均直径	R250
Code	電位 (kV)	<i>ms</i> (g/m ²)	$V_0(\mathrm{kV})$	fa	N (1/mm ²)	<i>D</i> (µm)	
ES01(C1)	1	8.33	0.99	0.12	26.09	106.16	0.69
ES02(C2)	1	13.84	1.11	0.14	12.28	143.84	0.72
ES03(C3)	1	5.76	1.00	0.14	17.23	132.09	0.74
ES04(C4)	1	8.35	1.03	0.10	16.75	111.81	0.75
ES05(C5)	1	9.90	1.05	0.15	19.62	119.91	0.68
ES06(C6)	1	5.44	1.01	0.18	21.23	114.61	0.71
ES07(C7)	1	6.79	1.01	0.17	29.19	104.09	0.73
ES08(C8)	1	6.02	1.02	0.16	33.93	121.73	0.72
ES09(C9)	1	3.00	1.01	0.17	38.51	92.73	0.60
ES10(C10)	1	4.98	0.95	0.17	30.42	97.39	0.67
ES11	0.9	3.05	0.94	0.08	29.32	71.06	0.53
ES12	0.7	6.24	0.72	0.11	18.58	102.51	0.73
ES13	0.8	5.49	0.8	0.15	15.42	127.68	0.73
ES14	0.8	9.91	0.81	0.15	17.98	137.65	0.58
ES15	0.7	6.19	0.76	0.11	19.75	136.43	0.56
ES16	0.4	7.58	0.45	0.10	10.66	137.20	0.76
ES17	1	6.48	0.99	0.10	11.24	122.99	0.55
ES18	0.8	5.99	0.84	0.10	15.28	116.57	0.62
ES19	0.7	4.90	0.72	0.16	11.82	143.82	0.65
ES20	0.5	4.62	0.48	0.08	13.76	104.89	0.82
ES21	0.5	8.62	0.51	0.11	11.27	126.51	0.71
ES22	0.5	8.75	0.55	0.15	17.51	116.75	0.85
ES23	0.8	9.29	0.79	0.16	16.15	137.61	0.70
ES24	0.7	9.48	0.7	0.15	14.04	145.92	0.68
ES25	0.8	0.96	0.79	0.10	12.98	109.05	0.72
ES26	0.9	8.13	0.93	0.12	13.32	129.71	0.68
ES27	0.8	6.45	0.86	0.09	14.82	118.24	0.62
ES28	0.9	5.27	0.95	0.08	16.01	106.39	0.73
ES29	0.9	8.16	0.93	0.11	8.87	150.80	0.72
ES30	1	12.00	0.99	0.26	24.04	164.48	0.63
ES31	1	18.18	0.97	0.30	20.43	167.27	0.73
ES32	1	10.12	0.95	0.18	38.74	108.61	0.63
ES33	1	11.74	0.97	0.28	34.64	140.51	0.60

Table.3-1 Experimental conditions and experimental results of ES samples

Sample	流量 (ml)	塗布量	初期表面電位	直径	R250
		<i>ms</i> (g/m ²)	$V_{\theta}(\mathrm{kV})$	D (mm)	
MD01	0.12	12.79	0.90	7.65	0.78
MD02	0.11	11.56	1.00	6.29	0.78
MD03	0.09	9.08	0.44	6.88	0.76
MD04	0.06	6.21	1.42	4.63	0.61
MD05	0.02	2.45	1.04	3.76	0.69
MD06	0.08	8.3	0.57	7.51	0.77
MD07	0.03	3.5	1.68	3.88	0.69
MD08	0.07	6.71	1.06	5.61	0.73
MD09	0.12	14.59	1.10	6.81	0.87
MD10	0.06	6.13	1.16	5.11	0.64
MD11	0.03	3.04	0.99	4.86	0.75
MD12	0.02	2.06	0.76	4.39	0. 71
MD13	0.01	1.28	1.77	2.78	0.64

Table.3-2 Experimental conditions and experimental results of MD samples



Fig.3-8 Samples ES11



Fig.3-9 Samples ES12



Fig.3-10 Samples ES13



Fig.3-11 Samples ES14



Fig.3-12 Samples ES15





Fig.3-14 Samples ES17





Fig.3-15 Samples ES18



Fig.3-16 Samples ES19



Fig.3-17 Samples ES20



Fig.3-18 Samples ES21



Fig.3-19 Samples ES22







Fig.3-22 Samples ES25



Fig.3-23 Samples ES26



Fig.3-24 Samples ES27



Fig.3-25 Samples ES28



Fig.3-26 Samples ES29



Fig.3-27 Samples ES30



Fig.3-28 Samples ES31



Fig.3-29 Samples ES32



Fig.3-30 Samples ES33



Fig.3-31 Samples MD01



Fig.3-33 Samples MD03



Fig.3-32 Samples MD02



Fig.3-34 Samples MD04



Fig.3-35 Samples MD05



Fig.3-37 Samples MD07



Fig.3-39 Samples MD09



Fig.3-41 Samples MD11



Fig.3-43 Samples MD13



Fig.3-36 Samples MD06



Fig.3-38 Samples MD08



Fig.3-40 Samples MD10



Fig.3-42 Samples MD12



Fig.3-44 Re-T relationship of ES11,ES12,ES13



Fig.3-46 Re-T relationship of ES17, ES18, ES19



Fig.3-48 Re-T relationship of ES23, ES24, ES25



Fig.3-50 Re-T relationship of ES29,ES30,ES31



Fig.3-45 Re-T relationship of ES14, ES15, ES16



Fig.3-47 Re-T relationship of ES20, ES21, ES22



Fig.3-49 Re-T relationship of ES26, ES27, ES28



Fig.3-51 Re-T relationship of ES32,ES33



Fig.3-54 Re-T relationship of MD7MD8MD9 Fig.3-55 Re-T relationship of MD10MD11MD12MD13

Fig.2-33~Fig.2-42 及び Fig.3-8~Fig.3-30 は ES サンプルの表面写真であり,凝集体の 状態を示した。小さなシリカ凝集体は、 100μ m 以上の凝集体の周りに配布されたが、 第二章説明した櫛形電極タイプやゲージ電極タイプと比べ数量は少ない。これらの小 さなシリカ凝集体は凝集体同士の孤立を影響し、研究の目的のため望まない現象であ った。Fig.2-50~Fig.2-52 及び Fig.3-44~Fig.3-51 は ES サンプル電荷保持率 *Re* の温度 T に依存する関係曲線を示した。大部分のサンプルは温度が 190℃に達するまで *Re* を 95%以上に維持する結果があった。

Fig.3-56 は、面積率 fa 対する電荷保持率 R250 の挙動を示した。従来のシリカ凝集 体エレクトレット CC サンプル(シリカ噴霧後コロナ放電で帯電させる)は過去の研 究から引用した[6]。ほかのパラメタが R250 に対する影響を除くため、ES サンプルの データは 0.9 < V_0 < 1.1 kV; 100 < D < 150[µm]; 10 < N < 30[1/mm²]の条件により選択さ れた。静電噴霧法を用いて作成したシリカ凝集体エレクトレットが従来のシリカ凝集 体エレクトレットより高い耐熱性を示すことは再び確認しまた。しかし fa と R250 と の間に相関は認められなかった。CC エレクトレットは、R250 が最初に fa の増加と共 に増加したことを実証したが、fa が 0.15 より高い場合、fa と R250 の間に相関は認め られなかった。

Fig.3-57 は電荷保持率 R250 に対する表面電位 V_0 の依存性を示した。ほかのパラメ タが R250 に対する影響を除くため、ES サンプルのデータは 100 < D < 150[µm]; 0 < N < 20[1/mm²]の条件により選択された。R250 は V_0 の増加とともに減少した。エレクト レットの耐熱性は一般に表面電位の上昇,すなわちバルク内部電場の増加に伴い低下 するため、 V_0 の増加に伴う R250 の劣化は妥当と考える[12]。もし点密度 N と平均直 径 D の値が定数になったら、この関係はもっと明確になったかもしれない。図の中黒 い直線は近似曲線であり、最小二条法で以下の関係方程式は算出した。

$$R250 = -0.34 * V_0 + 0.93 \tag{3-2}$$

式(3-2)により DとNが範囲内のサンプルのR250理論値が算出できる。

Fig.3-58 は電荷保持率 *R250* に対する点密度 *N*の依存性を示した。Fig.3-59 は電荷保 持率 *R250 と*平均直径 *D*の関係を示した。ほかのパラメタが *R250* に対する影響を除 くため, ES サンプルのデータは 0.9 < *V*₀ < 1.1 kV; 90 < *D* < 150 [µm]及び 0.9 < *V*₀ < 1.1 kV; $10 < N < 40 [1/mm^2]$ の条件により選択された。しかし $D \ge N$ はFig.3-60 に示すように相関関係があった。ゆえにR250が $D \ge N$ の依存性を研究する時,お互いの選択条件は狭い範囲内になれない。例えばDがほぼ定数のサンプルを選び,相応のNも全部近しい数字になって,R250 との関係は見られなかった。Fig.3-58 と Fig.3-59 に,R250 はNの減少 E Dの増大に伴って,明らかに上昇した。図の中黒い直線は近似曲線であった。

DとNは相関あり以上, R250との関係を解明するため, 二つのパラメタのなかに, ひとつを固定することが必要だった。実行の難易度から考えて,本研究は手動液滴形 成させる方法 MD を利用して, PFA フィルム上に一つだけのシリカ凝集体を作りまし た。即ち, Nは1であった。注射器の滴下量により,簡単にシリカ凝集体の直径 Dを 制御できた。Fig.3-31 から Fig.3-43 は, MD サンプルの表面写真であり,シリカ凝集 体の典型的な形状を示した。ES サンプルと違う,リング状の形状を示しました。この 現象は,コーヒーステイン効果と呼ばれています。その原因は,液滴の中央と回り部 分の蒸発速度によって誘導される毛細管流動であった。Table.3-2 のデータから, MD サンプルの凝集体の直径は初期液滴の量が一定であっても大きく変化したことが分 かった。 このような直径の変動は,いくつかの条件による蒸発プロセスの変化に関 連するはずだった。

MD サンプルの液滴は全部-1kV で充電されたが、V₀は Fig.3-61 に示すようにシリ カ凝集体の直径 D に依存した。この依存性は、いくつかの理由によって引き起こされ る可能性があった。PFA フィルム上の液滴へのチャージは、安定な方法ではなかった。 まず帯電した注射針が液滴から除去されたとき、液滴内部圧力の変化は不可避であっ た。その瞬間、液滴周囲の電場も激しく変動した。最終的に、PFA フィルム上と液滴 の接触面積は液滴形状の変動によって一定ではなかった。液滴中の電荷量は、注射針 が液滴から完全に分離した瞬時の接触面積に依存するはずだった。乾燥中に液滴の収 縮はもう一つの理由と思う。得られたシリカ凝集体がリング状に示す、そしてホット プレート上に 50℃で蒸発するため、MD サンプルの液滴収縮率は、通常に蒸発したシ リカ凝集体と比べて小さくなるはず。しかし、比表面積が大きくなるため、D が小さ い場合には蒸発速度を速くなる。これにより、液滴中の電荷が乾燥した凝集体に濃縮 される。Fig.3-61 は、D が減少とともにV₀が増加することを示した。この傾向は、D に対する収縮率に依存すると考えられる。

51

MD サンプルは ES サンプルと同様, Fig.3-62 に示すように *R250* が V_0 の増加ととも に明らかに減少した。図中の黒い直線は式(3-2)により, ES サンプルの *R250* と V_0 の関 係を表示した。Fig.3-62 に示す通り, MD サンプルはより高い耐熱性能があった。*R250* のこんな区別はシリカ凝集体直径の差によって引き起こされた。ES サンプルの D は 大体 100~150µm であり, MD サンプルの D が 2mm よりも大きいだった。表面電位が 耐熱性への影響を除くため, Fig.3-63 に 0.9 < V_0 < 1.1 kV の MD サンプルを選びまし た。*R250* は D の増加とともに上昇した。図の中黒い直線は近似曲線であり, 最小二 条法で以下の関係方程式は算出した。

$$R250 = -0.034 * D + 0.57 \tag{3-3}$$

式(3-3)により V_0 が1の MD サンプルの *R250* 推定値が算出できる。Fig.3-63 図中の ES サンプルのデータは式(3-2)により V_0 が1の時算出した ES の *R250* 推定値。横座標 は 0.9 < V_0 < 1.1 kV の ES サンプルの平均値であった。ES の推定値は式(3-3)で与えら れる MD サンプルの近似曲線と完全に一致する。したがって、シリカ凝集体エレクト レットの *R250* は、凝集体の直径に依存することを結論付けることができます。

その原因はシリカ凝集体の比表面積は、Dが小さいほど高くなる。ゆえにシリカ凝 集体とフッ素樹脂フィルム及び空気に接触する円周部の割合が増加する。この部分のシリ カ凝集体からフッ素樹脂フィルムへの負電荷の拡散が発生しやすいと推測される。Dが小 さいほど比表面積が高くなる、電荷拡散の可能性も大きくなります。絶縁材料に閉じ込 められた電荷の拡散速度は、一般的にバルクの表面積により高くなる[12,13]。そして ES 法には、スプレー中の温度湿度などの条件により、コロイダルシリカ液滴の大き さは大分バラツキになる。全体的に大きなコロイダルシリカ液滴は負電荷を捕獲させ る可能性も高い、結果的に PFA フィルム上に到着する電荷の割合が減少する。したが って、最後形成した D が大きいサンプルは、より高い耐熱性能を示す。



Fig.3-56 Relationship of *fa* and *R250* of ES and CC electrets. The samples are chosen with $-0.9 < V_0 < -1.1$ kV; 100 < D < 150 [µm]; 10 < N < 30 [1/mm²].



Fig.3-57 The *R250* behavior with V_0 of ES. The black line is an approximate curve calculated by the least squares method. The samples are chosen with 100 < D < 150 [µm]; 10 < N < 20 [1/mm²].



Fig.3-58 The *R250* behavior with *N* of ES. The black line is an approximate curve calculated by the least squares method. The samples are chosen with $0.9 < V_0 < 1.1$ kV; 90 < D < 150 [µm].



Fig.3-59 The *R250* behavior with *D* of ES. The black line is an approximate curve calculated by the least squares method. The samples are chosen with $0.9 < V_0 < 1.1$ kV; 10 < N < 40 [1/mm²].



Fig.3-60 Relationship of N and D of ES electrets. The black line is an approximate curve calculated by the least squares method.



Fig.3-61 Relationship between D and V_0 of MD samples



Fig.3-62 Relationship between V_0 and R250 of MD samples; solid line is estimation from Eq. (3-2)



Fig.3-63 Dependence of *R250* on *D* of MD samples; the samples are chosen with $-0.9 < V_0 < -1.1$ kV; triangle symbol represents the estimation of *R250* of ES samples

・3-4 結論

本章は静電噴霧法で作成したシリカ凝集体エレクトレットの耐熱性に影響を与え る因子を明らかにするため、2-2-4 の静電噴霧グリッド電極タイプ実験装置を使用し て、ES サンプルを作成するとともに、単一のシリカ凝集体を有するサンプルを手動 液滴形成法(MD)で作成した。次に、画像解析により各サンプルの表面写真からシリカ 凝集体対サンプルの面積率 fa;シリカ凝集体の点密度 N;シリカ凝集体の平均直径 D を測定した。そして、各サンプルについて加熱試験により 250℃における電荷保持率 *R250* を測定した。

その結果,エレクトレットの初期表面電位 V₀の増加に伴い *R250*の値は低下し, ES サンプルにおいては,平均直径が同一であれば, V₀に対して *R250* は線形に変化した。

また, ES は, D の増加および N の減少とともに R250 が上昇した。一方, N が一定 の MD サンプルの R250 はシリカ凝集体の直径に伴い増加した。そして, MD の R250 の実験値は, ES における R250 と D の関係から得られる最少二乗法の近似直線と良 い一致を示した。これらの結果から,シリカ凝集体エレクトレットの耐熱性を示すパ ラメーターである R250 は,凝集体径 D の影響を強く受けることが明らかとなった。 これは,凝集体の径が大きいほど,フッ素樹脂フィルム・シリカ凝集体・空気が接す るシリカ凝集体円周部の割合が減少することで,この領域でのシリカ凝集体からフッ 素樹脂フィルムへの負電荷の拡散が抑制されたためと推測される。 第4章 帯電方法と濡れ性を改善したコロイダルシリカを

用いたシリカ凝集体エレクトレットの作製と特性評価

·4-1 背景

前章でシリカ凝集体の径が増大すると、シリカ凝集体エレクトレットの耐熱性が向 上することが明らかとなった。しかし、コロイダルシリカを静電噴霧により塗布する と、必然的にクーロン反発による液滴の分裂が生じる。2章で最適化した静電噴霧に よるシリカ凝集体エレクトレットの作製方法(グリッド電極タイプ)では、このよう なコロイダルシリカ液滴の微細化は抑制されたが、通常のスプレー塗布より微細な液 滴が生じることは避けられなかった。

また、シリカ凝集体エレクトレットを増大させれば、シリカ凝集体の高さも増大す る。エレクトレットを ECS に用いる場合、エレクトレットは2つの電極の間にギャ ップを介して設置される。マイクロフォンの場合、ECS のギャップ幅は通常 20µm 程 度である。従って、シリカ凝集体の高さは ECM のギャップ幅より小さくする必要が ある。そのため、シリカ凝集体の形状は高さを抑えつつ径が大きい扁平な形状である ことが望ましいと思われる。一方、疎水性の PFA フィルムではコロイダルシリカと PFA フィルムの接触角が大きいため、液滴は半球に近い形状となるため、通常の乾燥 では扁平な形状にすることは困難である。

本研究ではまずコロイダルシリカを PFA フィルム表面にスプレー塗布し,乾燥す る前にコロナ放電でチャージすることで,液滴の微細化を抑え,シリカ凝集体に選択 的に負電荷をチャージすることを考えた。通常のスプレー塗布であれば静電噴霧より も液滴が微細化を抑えられるのは自明であるが,さらに塗布直後の乾燥する前の液滴 に状態であれば,コロナ放電により液滴は空気よりもはるかに誘電率が高いため,電 界にひきつけられて形状が変形する。その結果,液滴に電界が集中し,負電荷が液滴 に引きつけられる。その後液滴を乾燥させることで負電荷を選択的にチャージしたシ リカ凝集体が得られると考えた。

次に、グリセリンを用いてコロイダルシリカ液滴の接触角を低減させることを考えた。コロイド溶液の液滴の乾燥時に蒸発速度が速いと、コーヒーステイン現象が生じて扁平な形状の堆積物が得られ、液滴の接触角が小さいほど、コーヒーステイン現象が生じやすいことが知られている[15]。すなわち、フッ素樹脂表面におけるグリセリ

ンの接触角は水より小さいことから[16], コーヒーステイン現象が促進され, 乾燥後 に形成されるシリカ凝集体の形状がより扁平になるのではないかと考えた。本章では, コロイダルシリカ塗布直後にコロナ放電を行うことで,クーロン反発による液滴の微 細化を抑制したシリカ凝集体エレクトレットを作製した。次に,グリセリンを混合し たコロイダルシリカを塗布するとともに,あらかじめグリセリンを均一に PFA フィ ルム表面に塗布した後,コロイダルシリカを塗布することでコロイダルシリカの濡れ 性を改善してシリカ凝集体エレクトレットを作製した。そして得られたシリカ凝集体 の形状とエレクトレットの耐熱性を調べることで,シリカ凝集体の径の増大により ES 法により得られるシリカ凝集体エレクトレットと同等の耐熱性を有しながら,よ り薄いシリカ凝集体エレクトレットの作製方法について検討した。

- ·4-2 実験方法
- ·4-2-1 実験材料

2-2-1 と同様に,厚さ 12.5µm の PFA フィルムを 0.1 の市販の Al 板上に真空溶着に より、サンプルとした。

・4-2-2 シリカ塗布直後にコロナ放電で液滴チャージの SC 法(Spraying colloidal silica and charging droplets)でシリカ凝集体エレクトレットを作成

本章は以下三つの方法でシリカ凝集体エレクトレットを作成し、そして ES サンプ ルト比較する。まずシリカ凝集体の平均直径を増やすため、Fig.3-1 に示すようにス プレーガンでコロイダルシリカをスプレー塗布した後、液滴が乾燥する前に負電荷を チャージした。Fig.3-1(a)のように、高電圧を負荷せずにコロイダルシリカのスプレー 塗布を行った。ES と違って、スプレーノズルの方向はサンプル中心へ照準した。ノズ ルからサンプル中心までの距離は 18~20cm、塗布時間は 6~12 秒。そしてスプレー塗 布直後(塗布後 10 秒以内)に、Fig.3-1(b)に示すように針電極とグリッド電極を用い てサンプル表面に塗布されたコロイダルシリカ液滴のチャージを 15 秒に行った。そ の後、コロイダルシリカを自然乾燥させてシリカ凝集体エレクトレットとした。この 方法で作製したシリカ凝集体エレクトレットを SC サンプル(spraying colloidal silica and charging droplets)とした。



(b)

Fig.4-1 Experimental setup for preparation of silica-agglomerate electret using SC method

 ・4-2-3 グリセリンを塗布後に SC 法を行うことの GSC 法(Glycerin precoating before SC)でシリカ凝集体エレクトレットを作成

次に、シリカ凝集体の高さを減らすため、Fig.4-2 に示すようにあらかじめ静電噴霧 によりグリセリン液滴を微細にサンプルにプレコーティングした後に SC と同様にコ ロイダルシリカの塗布とチャージを行った。まず Fig.4-2(a)のように一般的な静電噴 霧法を利用して PFA フィルム表面に微細なグリセリン液滴を塗布した。スプレーガ ンノズルからサンプルまでの距離は 20cm。塗布時間は 10 分。-20kV に負荷した金属 スプレーガン (SPRAY-WORK 株式会社タミヤ)の前方にリング電極を設けることで 液滴を帯電させた。その後 Fig.4-2(b)と Fig.4-2(c)に示すように、SC と同様の手法でコ ロイダルシリカ液滴のスプレー塗布とコロナ放電による負電荷のチャージを行った。 グリセリンは常温で蒸発しにくいため、160℃のホットプレート上に 10min 保持して サンプルを加熱することで、シリカ凝集体を得た。この方法で作製したシリカ凝集体 エレクトレットを GSC サンプル(glycerin pre-coating before SC)とした。



(c)

Fig.4-2 Experimental setup for preparation of silica-agglomerate electret using GSC method

 ・4-2-4 グリセリンとシリカの混合溶液塗布の MC 法(Spraying mixed solution and charging droplets) でシリカ凝集体エレクトレットを作成

最後はコロイダルシリカとグリセリンの混合溶液をスプレーした。グリセリン (P9C06,健栄製薬株式会社)とコロイダルシリカ (20L,日産化学)の混合溶液を用 いて,Fig.4-3 に示すように SC と同様の手法でスプレー塗布とコロナ放電によるチ ャージを行った。コロイダルシリカとグリセリンの混合割合は質量比の1:1,1:2, 1:3,1:5。ノズルからサンプル中心までの距離は 18~20cm,塗布時間は 6~12 秒。 その後,グリセリンを蒸発させるため,GSC 法と同様に 160℃のホットプレート上に 10min 保持してサンプルを加熱することで、シリカ凝集体を得た。この方法で作製し たシリカ凝集体エレクトレットを MC サンプル (spraying mixed solution and charging droplets)とした。



Fig.4-3 Experimental setup for preparation of silica-agglomerate electret using GSC method

・4-2-5 シリカ凝集体エレクトレットの耐熱試験

2-2-6 に説明どおり,作製したサンプルの加熱試験はホットプレート上で行った。 静電電位計 ESD を用いて初期表面電位 V₀を測定した。Fig.4-4 に加熱試験時の表面電 位測定結果の例を示す。実験データ間を線形補間することで 250℃における表面電位 の大きさ V250 を求めた。また、サンプル MC および GSC は作製時に 160℃10min で 加熱するため、V₀については、MC および GSC は加熱試験直前の電位とする、ES お よび SC 実験データ間の線形補間を用いて計算した 160℃の表面電位の大きさとした。 Table.3-1 の ES サンプルの V₀は常温で測定したが、本章の研究のため、全部 160℃で の電位を使用した。シリカ凝集体の塗布量 *ms* はサンプル塗付前とシリカ凝集体乾燥 後の質量の差とした。また、マイクロメータを使用して、サンプル中心とまわり合計 九点のシリカ凝集体の高さを測定し、その平均値をシリカ凝集体最大高さ h とした。 さらに、凝集体の平均直径 D は、撮像画像からの ImageJ を用いた画像解析により計 算した。



Fig.4-4 Typical Vs behavior with temperature in heating test.

Vi : initial value of surface electric potential;

V250 : surface electric potential at 250°C;

・4-3 実験結果と分析

ES 法 (Electrostatic spraying), SC 法(Spraying colloidal silica and charging droplets), GSC 法(Glycerin pre-coating before SC)と MC 法(Spraying mixed solution and charging droplets)を用いて, 作製したシリカ凝集体エレクトレットの測定結果は以下に示す (以 下は ES 法, SC 法 GSC 法と MC 法で)。作製したシリカ凝集体エレクトレットの測定 結果は以下に示す。

Table.4-1 から Table.4-3 には SC 法, GSC 法と MC 法で作製したシリカ凝集体エレ クトレットの実験条件と実験結果を示す。Table.4-3 の混合割合はコロイダルシリカと グリセリンの質量比だった。Fig.4-5~Fig.4-74 は各サンプルの実体顕微鏡による表面写 真である。Fig.4-75~Fig.4-96 は各サンプル加熱実験の電荷保持率 *Re* と温度 T の関係 曲線である。そして 2-2-6 に説明どおり,各サンプル 250℃での電荷保持率 *R250* を計 算した。

Sample	塗布量	初期表面電位	高さ	平均直径	R250	V250
Code	<i>ms</i> (g/m ²)	$V_{\theta}(\mathrm{kV})$	<i>h</i> (µm)	<i>D</i> (μm)		
SC01	5.93	1.06	69	129.17	0.70	0.74
SC02	3.58	1.09	43	76.67	0.75	0.82
SC03	9.61	1.04	73	118.36	0.76	0.79
SC04	21.09	1.04	129	241.47	0.77	0.80
SC05	15.69	1.03	89	179.35	0.87	0.90
SC06	6.55	0.99	73	94.20	0.72	0.71
SC07	21.81	0.99	138	184.70	0.73	0.72
SC08	14.56	1.07	93	154.40	0.72	0.77
SC09	17.78	1.05	114	172.83	0.79	0.83
SC10	12.36	1.04	93	180.37	0.73	0.76
SC11	2.74	1.03	35	78.23	0.53	0.55
SC12	4.83	1.03	69	104.14	0.78	0.80
SC13	6.24	1.03	78	101.55	0.66	0.68
SC14	5.2	0.98	91	126.20	0.73	0.71
SC15	10.11	1.11	65	112.14	0.75	0.83
SC16	4.67	0.81	46	95.26	0.87	0.70
SC17	19.98	0.85	128	198.13	0.88	0.75
SC18	13	0.77	95	155.93	0.84	0.65
SC19	14.48	0.76	112	159.46	0.92	0.70
SC20	11.33	0.68	91	154.34	0.96	0.65
SC21	13.17	0.72	108	138.75	0.97	0.70
SC22	9.51	0.62	84	137.49	1.00	0.62
SC23	14.28	0.63	122	134.13	0.95	0.60

Table.4-1 Experimental conditions and experimental results of SC samples

Sample	塗布量	初期表面電位	高さ	平均直径	R250	V250
Code	<i>ms</i> (g/m ²)	$V_{\theta}(\mathrm{kV})$	<i>h</i> (µm)	<i>D</i> (µm)		
GSC01	12.75	0.69	51	197.40	0.95	0.66
GSC02	7.6	0.79	42	157.92	0.90	0.71
GSC03	16.04	0.92	66	152.71	0.79	0.73
GSC04	6.38	0.84	50	108.48	0.76	0.64
GSC05	5.96	0.85	36	103.65	0.80	0.68
GSC06	3.64	0.94	30	82.19	0.89	0.84
GSC07	7.17	0.8	50	84.23	0.86	0.69
GSC08	10.83	0.7	56	107.73	0.73	0.51
GSC09	11.74	0.86	65	129.45	0.84	0.72
GSC10	3.37	0.56	35	127.19	0.90	0.50
GSC11	4.63	0.67	45	120.44	0.91	0.61
GSC12	5.89	0.62	46	144.81	0.96	0.60
GSC13	8.08	0.67	42	200.41	0.83	0.56
GSC14	6.81	0.74	59	150.75	0.83	0.61
GSC15	4.78	0.62	42	115.37	0.94	0.58
GSC16	6.89	0.72	47	125.05	0.91	0.66

Table.4-2 Experimental conditions and experimental results of GSC samples

Sample	混合	塗布量	初期表面電位	高さ	平均直径	R250	V250
Code	割合	ms (g/m ²)	$V_0(\mathrm{kV})$	<i>h</i> (µm)	<i>D</i> (µm)		
MC01	1:1	1.81	0.86	22	78.29	0.89	0.77
MC02	1:1	4.23	0.78	32	88.80	0.92	0.72
MC03	1:1	5.12	0.68	42	107.88	0.88	0.60
MC04	1:1	14.34	0.54	76	206.18	0.8	0.43
MC05	1:1	8.06	0.69	47	129.25	0.78	0.54
MC06	1:1	6.69	0.62	46	134.74	0.83	0.51
MC07	1:1	0.87	0.76	15	80.60	0.64	0.49
MC08	1:1	1.72	0.47	19	89.67	0.82	0.39
MC09	1:1	1.06	0.75	17	80.44	0.87	0.65
MC10	1:1	0.95	0.77	13	82.51	0.75	0.58
MC11	1:1	0.81	0.76	11	82.17	0.87	0.66
MC12	1:2	1.76	0.85	18	87.64	0.78	0.66
MC13	1:2	2.82	0.65	26	87.47	0.86	0.56
MC14	1:2	3.84	0.65	38	89.45	0.92	0.60
MC15	1:2	3.21	0.63	31	88.68	0.92	0.58
MC16	1:2	9.18	0.35	61	149.70	0.72	0.25
MC17	1:2	5.97	0.75	50	143.62	0.93	0.70
MC18	1:2	4.73	0.42	39	117.74	0.89	0.37
MC19	1:2	5.06	0.61	44	102.48	0.86	0.52
MC20	1:3	1.07	0.67	16	81.77	0.81	0.54
MC21	1:3	1.01	0.43	15	89.07	0.75	0.32
MC22	1:3	1.44	0.62	15	86.68	0.82	0.51
MC23	1:3	1.44	0.51	21	84.75	0.82	0.42
MC24	1:3	1.44	0.61	20	100.78	0.84	0.51
MC25	1:3	2.36	0.66	28	104.86	0.87	0.57
MC26	1:3	1.83	0.47	23	97.64	0.92	0.43
MC27	1:3	2.83	0.45	24	121.71	0.84	0.38
MC28	1:5	0.82	0.5	13	86.75	0.67	0.35
MC29	1:5	1.11	0.63	17	93.01	0.81	0.51
MC30	1:5	0.88	0.58	12	92.30	0.84	0.49
MC31	1:5	1.94	0.5	18	115.46	0.88	0.44

Table.4-3 Experimental conditions and experimental results of MC samples



Fig.4-5 Samples SC01



Fig.4-6 Samples SC02



Fig.4-7 Samples SC03



Fig.4-8 Samples SC04



Fig.4-9 Samples SC05





Fig.4-11 Samples SC07





Fig.4-12 Samples SC08



Fig.4-13 Samples SC09





Fig.4-15 Samples SC11





Fig.4-16 Samples SC12



Fig.4-17 Samples SC13





Fig.4-19 Samples SC15

Fig.4-18 Samples SC14



Fig.4-20 Samples SC16



Fig.4-21 Samples SC17



Fig.4-22 Samples SC18



Fig.4-23 Samples SC19



Fig.4-24 Samples SC20



Fig.4-25 Samples SC21



Fig.4-27 Samples SC23



Fig.4-26 Samples SC22



Fig.4-28 Sample GSC01


Fig.4-29 Samples GSC02





Fig.4-31 Samples GSC04



Fig.4-32 Samples GSC05

100µ



Fig.4-33 Samples GSC06





Fig.4-35 Samples GSC08

Fig.4-34 Samples GSC07



Fig.4-36 Sample GSC09



Fig.4-37 Samples GSC10





Fig.4-39 Samples GSC12





Fig.4-40 Samples GSC13



Fig.4-41 Samples GSC14





Fig.4-43 Samples GSC16





Fig.4-44 Sample MC01



Fig.4-45 Samples MC02





Fig.4-47 Samples MC04





Fig.4-48 Samples MC05



Fig.4-49 Samples MC06





Fig.4-51 Samples MC08

Fig.4-50 Samples MC07



Fig.4-52 Sample MC09



Fig.4-53 Samples MC10





Fig.4-55 Samples MC12





Fig.4-56 Samples MC13



Fig.4-57 Samples MC14





Fig.4-59 Samples MC16





Fig.4-60 Sample MC17



Fig.4-61 Samples MC18





Fig.4-63 Samples MC20





Fig.4-64 Samples MC21



Fig.4-65 Samples MC22





Fig.4-67 Samples MC24

Fig.4-66 Samples MC23



Fig.4-68 Sample MC25



Fig.4-69 Samples MC26



IOQET

Fig.4-71 Samples MC28

Fig.4-70 Samples MC27



Fig.4-72 Samples MC29



Fig.4-73 Samples MC30



Fig.4-74 Samples MC31





Fig.4-75 Re-T relationship of SC01, SC02, SC03



Fig.4-77 Re-T relationship of SC07, SC08, SC09



Fig.4-79 Re-T relationship of SC13, SC14, SC15



Fig.4-81 Re-T relationship of SC19, SC20, SC21

Fig.4-76 Re-T relationship of SC04, SC05, SC06



Fig.4-78 Re-T relationship of SC10, SC11, SC12



Fig.4-80 Re-T relationship of CS16,SC17,SC18







Fig.4-83 Re-T relationship of GSC1, GSC2, GSC3



Fig.4-85 Re-T relationship of GSC7, GSC8, GSC9 Fig.4-86 Re-T relationship of GSC10, GSC11, GSC12











Fig.4-88 Re-T relationship of GSC15,GSC16



Fig.4-90 Re-T relationship of MC4, MC5, MD6





Fig.4-92 Re-T relationship of MC10, MC11, MC12

1.2 Re

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

•-MC16

□-MC17

△−MC18

100

50

Fig.4-91 Re-T relationship of MC7, MC8, MC9



Fig.4-93 Re-T relationship of MC13, MC14, MC15



Fig.4-95 *Re*-T relationship of MC19,MC20,MC21



150

200

250 300 T[°C]



Fig.4-96 Re-T relationship of MC22, MC23, MC24



Fig.4-96 Re-T relationship of MC25, MC26, MC27 Fig.4-96 Re-T relationship of MC28, MC29, MC30, MC31

Fig.2-33~Fig.2-42 及び Fig.3-8~Fig.3-30 は ES サンプル, Fig.4-5~Fig.4-74 は SC, GSC と MC サンプルの表面写真であり、凝集体の状態を示した。ES サンプルでは 100 µm 前後の粗大なシリカ凝集体周辺に多数の微細なシリカ凝集体が形成されていた。これ は静電噴霧法により、液滴が飛行中に静電反発により微細化したためと考えられる [7,8]。一方, Fig.4-5~Fig.4-27 に示すように SC サンプルでは静電噴霧により液滴の微 細化が無くなったため、微細なシリカ凝集体の数が ES より大幅に減少した。この傾 向は Fig.4-28~Fig.4-74 に示すように, GSC および MC サンプルでも認められた。一 方, MC および GSC サンプルのシリカ凝集体の大きさは SC と比較して顕著な差は認 められなかった。しかし, MC および GSC サンプルは凹型のシリカ凝集体が多数発生 していた。これは、乾燥時にコーヒーステイン現象が生じたためである。MC および GSC サンプルは、コロイダルシリカ液滴はグリセリンとの混合している (GSC はコ ロイダルシリカ液滴が PFA フィルムに付着するときにプレコーティングされたグリ セリン液滴と混合する)。これにより、PFA 表面での液滴の接触角が低減するととも に、160℃で乾燥させることで蒸発速度が増したことで、コーヒーステイン現象が促 進されたと考えられる。また、GSC サンプルは、他のサンプルと比較して球状では なくいびつな形状のシリカ凝集体が認められた。GSC サンプルは、 微細なグリセリン 液滴によるプレコーティングにより, PFA 表面が疑似的に親水性になることを期待し て作製した。しかしながらプレコーティングしたグリセリン液滴とコロイダルシリカ 液滴の混合比が一定でないため, いびつな形状のシリカ凝集体が生成されたものと考 えられる。

Fig.4-97 と Fig.4-98 に各サンプルのシリカ凝集体の塗布量 ms と平均直径 D 及び高 さh との関係を示した。MC サンプルに対して,コロイダルシリカとグリセリンの混 合割合は1対1。Fig.4-97 に塗布量の増大とともに平均直径は増加する傾向にありま すが,ばらつきが大きい,サンプルによる傾向の差異は認められなかった。一方,Fig.4-98 にシリカ凝集体の塗布量 ms との関係を示した。ES サンプルに対して SC は ms と h の関係に大きな差は認められないが,GSC と MC は明らかに h が低下する傾向を示 した。これは,GSC と MC サンプルの表面写真に示すように,コロイダルシリカ液滴 の乾燥時にコーヒーステイン現象が生じたことでシリカ凝集体の形状が凹型に変化 したことが原因と考えられる。従って,グリセリンによりコロイダルシリカ液滴の接 触角を低減させることでフッ素樹脂表面に形成されるシリカ凝集体の高さを低減す

ることができた。最初 GSC 方法は疎水性の PFA フィルム上に薄いグリセリン親水層 を作り、次に塗布するコロイダルシリカ液滴を平坦になる方法であるはず。しかし実 験中に、我々はコロイダルシリカとグリセリンが混合して、増強されたコーヒーステ イン現象により、薄いシリカ凝集体が得ることを観測できた。したがって、コロイダ ルシリカとグリセリンの混合溶液を使用する MC 方法を考えました。Fig.4-99 と Fig.4-100 に各混合割合の MC サンプルの ms と D 及び h の関係を示した。塗布量の増大と ともに平均直径は増加する傾向は同じ。グリセリンの量が多い場合,より低い h と高 い D を示した。h のそういう傾向はあんまり明確ではないが,Fig.4-100 に D はグリ セリンの量が多いほど増加したことは明らかだった。この結果により、グリセリンが シリカ凝集体を平坦化に有効であることを結論付けできた。各混合割合同じ ms のサ ンプルには、グリセリンの量が多い場合液滴の大きさが高い。コーヒーステイン現象 の原因は液滴の中央と回り部分の蒸発速度によって誘導される毛細流動であった。ゆ えに、中央部分は急速に収縮し、直径方向はあんまり変わらない。結果とした、大き な液滴は直径が大きいシリカ凝集体になった。そして凝集体の高さは液滴の大きさに 関係なく、ほぼ同じだった。

Fig.4-99 に示すように GSC と MC サンプルは, ES および SC サンプルと比較して 初期表面電位 V_0 が低下する傾向を示した。これらのサンプルはコロナ放電によるチ ャージ直後はいずれも表面電位は $-0.95 \sim -1.08$ kV あったことから, グリセリンを蒸 発させるために行った 160℃の加熱による影響が大きい。一方, Fig.4-75~Fig.4-96 に 加熱試験時の各サンプルの電荷保持率の挙動を示した。いずれの方法にも 160℃まで の加熱では表面電位はほとんど変化せず電荷保持率は 100%以上であった。これらの 結果は, グリセリンとの混合溶液の状態で帯電したコロイダルシリカ液滴を乾燥させ たことで電荷が拡散したことと考える。そして, Fig.4-75~Fig.4-96 にいずれの方法で 作製したサンプルは 200℃付近まで表面電位はほとんど変化せず, 200℃以上になる とゆるやかに表面電位が低下した。このことから,各サンプルの電荷の拡散メカニズ ムは同じであると考えられ,サンプル SC, MC, GSC も ES と同様にシリカ凝集体に 選択的に負電荷がチャージされたものと思われる。

第三章に V₀が大きいほど電荷保持率 R250 は低下する傾向があることを説明した。 ゆえに以下, V₀が 0.75 kV 以上の GSC と MC サンプルに限定して考察を行った。Fig.4-100 に各方法 R250 と D の関係を示した。第三章の結果に相応しい, 0.9 < V₀ < 1.1 kV

範囲内の ES と SC サンプルの R250 は D の増加とともに明らかに上昇した。SC サン プルは同じ V₀及び同じ D の ES サンプルより高い R250 を示した。耐熱性の向上が認 められた。それに対して GSC と MC の R250 は D との相関関係は不明確だったが, ES と SC より高い結果を示した。その原因は,GSC と MC の V₀範囲が広い,より低 い電位がより高い電荷保持率を導いた。また,Fig.4-101 に D と V250 の関係を示し た。D が 100µm 以下の場合,SC,MC,GSC はいずれも同じ D において ES よりも高い V250 を示した。これは,表面写真に示すように,微細なシリカ凝集体の形成が抑えら れたことが原因と考えられる。一方,SC,MC,GSC の間に大きな差は無く,D に対し ても明確な相関は認められなかった。これは,ある程度大きなD であれば、シリカ凝 集体エレクトレットの耐熱性は同程度になることを示唆しており、これ以上大きなD のシリカ凝集体を形成してもシリカ凝集体エレクトレットの耐熱性は向上しないと 思われる。

Fig.4-104 と Fig.4-105 に h と R250 及び V250 の関係を示した。ES と SC サンプ ルの R250 及び V250 が h とともに増加する傾向があった。その原因は半球形の ES と SC サンプルのシリカ凝集体に、h が大きい場合 D も多き可能性が高い。GSC と MC サンプルは h と R250 及び V250 に明確な相関は認められなかったが、GSC および MC は h が小さいサンプルにおいても高い V250 を示した。その結果、MC において h=11 μ m で V250 =0.66kV、GSC において h = 30 μ m で V250 = 0.84 kV のサンプルを得るこ とができた。生産中にグリッド電極の電圧を-1kV を設定したため、電圧を向上させな らば、表面電位がもっと高いサンプルも得る。これらの結果は、グリセリンをコロイ ダルシリカに加えることで、シリカ凝集体エレクトレットの高い耐熱性を維持しなが ら凝集体の高さを低減できることを示している。ECM に適用するためには 20 μ m 以 下の h が必要であるが、グリセリンの混合比率またはプレコーティングの条件を調節 することで、薄いそして高い耐熱性を維持するシリカ凝集体エレクトレットを安定て きな生産できる。



Fig.4-97 Relationship between the amount of silica agglomerates *ms* and the average diameter *D*. The MC samples are chosen with the mixing ratio of colloidal silica and glycerin equal 1:1.



Fig.4-98 Relationship between the amount of silica agglomerates ms and the maximum height of silica agglomerates h. The MC samples are chosen with the mixing ratio of colloidal silica and glycerin equal 1:1.



Fig.4-99 Relationship between the amount of silica agglomerates *ms* and the average diameter *D*. The mixing ratio of colloidal silica and glycerin equal are 1:1; 1:2; 1:3; 1:5.



Fig.4-100 Relationship between the amount of silica agglomerates ms and the maximum height of silica agglomerates h. The mixing ratio of colloidal silica and glycerin equal are 1:1; 1:2; 1:3; 1:5.



Fig.4-101 Relationship between the maximum height of silica agglomerates h and initial value of surface electric potential V_0 . The MC samples are chosen with the mixing ratio of colloidal silica and glycerin equal 1:1.



Fig.4-102 Relationship between the charge retention rate at 250°C *R250* and the average diameter *D*. The ES and SC samples are chosen with $0.9 < V_0 < 1.1$ kV; the GSC and MC samples are chosen with $0.75 < V_0 < 1$ kV.



Fig.4-103 Relationship between the surface electric potential at 250°C V250 and the average diameter *D*. The ES and SC samples are chosen with $0.9 < V_0 < 1.1$ kV; the GSC and MC samples are chosen with $0.75 < V_0 < 1$ kV.



Fig.4-104 Relationship between the charge retention rate at 250°C *R250* and the maximum height of silica agglomerates *h*. The ES and SC samples are chosen with $0.9 < V_0 < 1.1$ kV; the GSC and MC samples are chosen with $0.75 < V_0 < 1$ kV.



Fig.4-105 Relationship between the surface electric potential at 250°C V250 and the maximum height of silica agglomerates *h*. The ES and SC samples are chosen with $0.9 < V_0 < 1.1$ kV; the GSC and MC samples are chosen with $0.75 < V_0 < 1$ kV.

・4-4 結論

本章は静電噴霧法によるシリカ凝集体エレクトレットの作製方法 (ES) の改善を目 的として、コロイダルシリカをスプレー塗布直後にコロナ放電で帯電させる方法 (SC)、 グリセリンとコロイダルシリカの混合溶液をスプレー塗布直後にコロナ放電で帯電 させる方法 (MC)、サンプル表面に微細なグリセリンをプレコーティングしてから、 SC と同様にシリカ凝集体エレクトレット方法 (GSC) を用いてサンプルを作製し、加 熱時の耐熱性能を調べた。

(1) コロイダルシリカ液滴塗布直後にコロナ放電を行うことで, ES で認められた 微細なシリカ凝集体の形成が抑えられた。

(2) グリセリンを混合もしくはプレコーティングした MC および GSC において は、凹型のシリカ凝集体が形成された。これはグリセリンの混合によるコロイダルシ リカ液滴の接触角低減とグリセリン蒸発のための加熱により、コーヒーステイン現象 が生じたためと思われる。その結果、GSC および MC のシリカ凝集体の高さ h は ES および SC より減少したが、初期表面電位の大きさも低下した。

(3) SC, MC, GSC の加熱後の表面電位 V250 は ES よりも向上した。これは微細な シリカ凝集体の形成を抑制したことが原因と考えられる。また, MC および GSC にお いては,高さ h が減少しても高い電荷保持率を示した。この結果, MC において h=11 µm で V250=0.66kV のサンプルが得られた。製造時のグリッド電極の負荷電位を増加 させならば,さらに高い表面電位シリカ凝集体エレクトレットが得られると推測され ることから,グリセリンを用いることで ECS に利用可能なシリカ凝集体エレクトレ ットを作製することは可能と考えられる。

第5章 結言

本論文の研究対象であるシリカ凝集体エレクトレットは、疎水性の PFA フィルム 上で孤立したシリカ凝集体を形成することで電荷の拡散を防ぎ、耐湿性と耐熱性を両 立させることが可能である。しかし、シリカ凝集体を形成後、コロナ放電でエレクト レット化するとシリカ凝集体だけではなく PFA フィルム上にも電荷が付着し、耐熱 性の低下を生じる。そこで呉らは、静電噴霧法を用いて負に帯電したコロイダルシリ カ液滴を塗布・乾燥してシリカ凝集体を形成することにより、選択的に負電荷をチャ ージしたシリカ凝集体エレクトレットを作製し、従来のシリカ凝集体エレクトレット より耐熱性が向上することを明らかにした。本研究では、これらの先行研究の結果を 発展させ、シリカ凝集体エレクトレットの作製手法の最適化を行い、シリカ凝集体に よりエレクトレットの耐熱性が向上する因子を明らかにするとともに、基板実装を想 定したエレクトレットセンサー (ECS) に適用可能なシリカ凝集体エレクトレットを 作製することを試みた。その結果、以下の結論を得た。

(1) 静電噴霧によるシリカ凝集体エレクトレットの作製方法の検討

櫛形電極タイプ,ゲージ電極タイプ,グリッド電極タイプ,三つの従来静電噴霧法 の改良方法によりシリカ凝集体エレクトレットを作製し,作製後の初期表面電位 Vo とシリカ凝集体の塗布量 ms を測定した。さらに,作製したエレクトレットを加熱し て耐熱性を調べた。その結果,グリッド電極タイプで作成したシリカ凝集体エレクト レットが最も優れた耐熱性を示した。(ES の R250 は CC より平均的に 27%の向上を 示した)また,この手法ではエレクトレットの表面電位を制御することが容易であっ た。これらの結果から 以降の研究では,静電噴霧法によるシリカ凝集体エレクトレ ット (ES) は、グリッド電極タイプにより作製した。

(2) シリカ凝集体エレクトレットの耐熱性に及ぼす凝集体形状の影響

シリカ凝集体によりエレクトレットの耐熱性が向上するメカニズムを解明するために, ES によりシリカ凝集体エレクトレットを作製するとともに,シリンジを用いて単一のシリカ凝集体エレクトレット(MD)を作製した。そしてこれらエレクトレットについて,初期表面電位 V₀,シリカ凝集体の面積比 *fa*,点密度 *N*,平均直径と R250

の関係を調べた。その結果, ES サンプルにおいて、V₀とNの減少、Dの増加ととも に R250 が向上することが分かった。一方, fa と ms は R250 との相関は認められなか った。一方, MD サンプルおいても D の増加に伴い, R250 は向上した。 MD サンプ ルは単一のシリカ凝集体であることから N の影響は無いため, ES においても D の増 加が R250 の向上に寄与したと推察された。さらに, ES における D と R250 の関係を 線形近似し, MD の D における R250 を算出したところ,実験値とよく一致した。これ らの結果から,シリカ凝集体エレクトレットの耐熱性 (R250) は,凝集体の直径に強 く依存すると結論できた。

(3) 帯電方法と濡れ性を改善したコロイダルシリカを用いたシリカ凝集体エレクトレットによる耐熱性の向上

シリカ凝集体エレクトレットの耐熱性をさらに向上させるためには、シリカ凝集体 の径 D を増加させればよいが、そのためには 2 つの問題点があった。まず、静電噴霧 を用いると必然的にクーロン反発により液滴が分裂するため、シリカ凝集体の微細化 が生じてしまった。次に、PFA フィルムは疎水性であるため、コロイダルシリカとの 接触角が大きく、半球形に近い液滴が形成されるため、扁平なシリカ凝集体を形成す ることが困難であった。そこで、本研究では、コロイダルシリカをスプレー塗布直後 に帯電させることで、クーロン反発による液滴の微細化を抑制するとともに、グリセ リンを用いてコロイダルシリカの濡れ性を改善することで扁平なシリカ凝集体の形 成を試みた。

その結果,コロイダルシリカをスプレー塗布直後にコロナ放電で帯電させる方法 (SC)により。ES で認められた微細なシリカ凝集体の形成が抑えられ、耐熱性能も 上昇した。さらに、グリセリンを混合したコロイダルシリカを塗布直後にコロナ放電 で帯電させる方法(MC)と、グリセリンをあらかじめ静電噴霧により均一に PFA 表 面に塗布した後に、SC と同様にコロイダルシリカを塗布・帯電させる方法(GSC)に よってシリカ凝集体を形成させた。その結果、グリセリンによりコロイダルシリカの 濡れ性が改善しただけでなく、乾燥時のコーヒーステイン現象が誘起されやすくなっ たことから、SC より扁平なシリカ凝集体を得ることができた。一方で、グリセリン 蒸発時に一部の電荷が拡散し、初期表面電位は低下した。しかしながら、MC におい て *h*=11 μ m のシリカ凝集体エレクトレットを作製したところ初期表面電位の大きさ は0.76kV にとどまったが、加熱試験後の表面電位 V250 は0.66kV であり、20µm 以下 のシリカ凝集体では、最も優れた V250 を示した。また、チャージ時のグリッド電極 の電圧を増加させれば、MC で得られるサンプルの初期表面電位をさらに向上させる ことができ、その結果 V250 も増加させることができると考えられる。エレクトレッ トコンデンサセンサ(ECS)は、エレクトレットを電極間のギャップに挿入するが、一 般的なマイクロフォン用の ECS のギャップは 20µm 程度であることから、MC を用い ることで、このような ECS に適用可能である。その結果、耐リフロー性を有するシリ カ凝集体エレクトレットを製造することができ、ECS を基板に実装することも可能に なる。このように、本研究で得られた高い耐熱性を有するシリカ凝集体エレクトレッ トは、エレクトレットセンサの可能性を大きく広げ、マイクロフォンだけでなく、モ ーションセンシング、水素ガス濃度測定、生体超音波センサなど幅広い分野に実用化 されることが期待される。

参考文献

- (1) V.M. Kestelman, L.S. Pinchuk, and V.A. Goldade: "Electrets in Engineering Fundamentals and Applications", Kluwer Academic Publishers (2000).
- (2) G.M. Sessler and J.E. West: "Foil-Electret Microphones", J. Acoust. Soc.Am., Vol.40, pp. 1433–1440 (1966).
- (3) Yasuno, Y. and Ohga, J, Temperature characteristics of electret condenser microphones, Acoust. Sci. & Tech., Vol. 27, No. 4 (2006), pp. 216-224.
- (4) J.A. Giacometti, F. Sergei, and M.C. Mauro: "Corona Charging of Polymers: Recent Advances on Constant Current Charging", Brazilian Journal of Physics, Vol.29, NO.2, pp. 269–279 (1999).
- (5) X. Zhongfu: "Corona Charging and Charge Decay of Teflon-PFA", IEEE Transactions on Electrical Insulation, Vol.28, NO.8, pp. 1104–1111(1991).
- (6) K. Kageyama, S. Mimura and T. Sakai: "Improvement of Heat Resistance of PFA Film Electret using Silica Agglomerates", IEEJ Transactions on Sensors and Micromachines, Vol.135, NO.5, pp.122-128 (2015) (in Japanese) 蔭山 健介, 三村 昌平,坂井 建宣: シリカ凝集体を用いた PFA フィルムエ レクトレットの耐熱性向上, 電気学会論文誌 E, Vol. 135, pp122-128 (2015)
- (7) B. Hakberg, S. Lindqvist, B. Carisson and T. Hogberg: "A Theoretical Model for Electrostatic Spraying and Coating", Journal of Electrostatics, Vol.14, NO.3, pp.255–268 (1983).
- (8) M. Cloupeau and B. Prunet-Foch: "Electrostatic Spraying of Liquids: Main Functioning Modes", Journal of Electrostatics, Vol.25, NO.2, pp.165–184 (1990).
- (9) Zohra Olumee, John H. Callahan, and Akos Vertes, Droplet Dynamics Changes in Electrostatic Sprays of Methanol-Water Mixtures, J. Phys. Chem. A, Vol. 102, No. 46 (1998), pp9154-9160.
- (10) E.M. Bringa, Molecular dynamics simulations of Coulomb explosion, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, Vol. 209 (2003), pp.1–8.
- (11)National Institutes of Health, Image Processing and Analysis in Java, https://imagej.nih.gov/ij/
- (12) C. Thielemann and G. Hess: Inorganic Electret Membrane for A Silicon Microphone, Sensors and Actuators A: Physical, 61–3 (1997), 352–355.
- (13) David Vanderbilt and R. D. King-Smith, Electric polarization as a bulk quantity and its relation to surface charge, PHYSICAL REVIEW B, Vol. 48, No. 7 (1993), pp.4442-4455.
- (14) M. Gunji, and M. Washizu: "Self-propulsion of a water droplet in an electric field", Journal of Physics D Applied Physics, Vol. 38, NO.14, pp. 2417–2423 (2005).
- (15) R. D. Deegan, O. Bakajin, T. F. Dupont, G. Huber, S. R. Nagel and T. A. Witten: "Capillary flow as the cause of ring stains from dried liquid drops", Nature, Vol. 389, pp. 827–829 (1997).
- (16) C. J. Van Oss, R. J. Good and M. K. Chaudhury: "Additive and nonadditive surface tension components and the interpretation of contact angles", Langmuir, Vol. 4, NO.4, pp. 884–891 (1988).

謝辞

本研究を進めるにあたり、蔭山健介教授には基本的な考え方から実験の方法、研究 に対する多くの助言など様々な御指導を頂き、深く感謝しております.坂井建宣准教 授にも研究に対する助言のほか、論文等の作成にあたって助言や校正をして下さり、 深く感謝しております.また、川田良暁技官には実験装置の使用方法、実験材料の準 備などに深く感謝しております.そして様々なご協力をいただいた大学院生、学部生 の皆様にも心から感謝いたします。最後に、本学材料工学研究室の今後のますますの 御発展、御活躍を期待し、謝辞とさせていただきます。